

SPring-8利用推進協議会 先端磁性材料研究会（第6回）
『スピントロニクス材料におけるX線磁気観測の新展開』

2013年3月11日
連合会館

SPring-8 BL39XUにおける ナノビームX線磁気解析

鈴木 基寛

高輝度光科学研究中心 (JASRI/SPring-8)

ナノ磁性：ナノ構造と機能

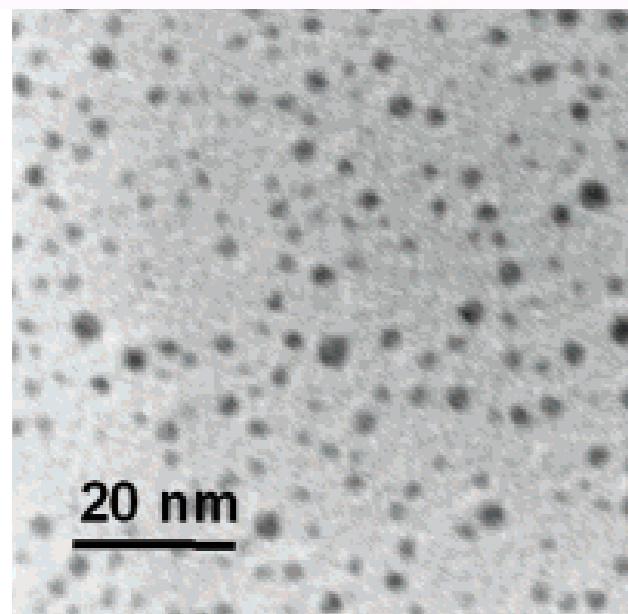
- ・基礎磁気物性の探求
- ・産業・技術的応用



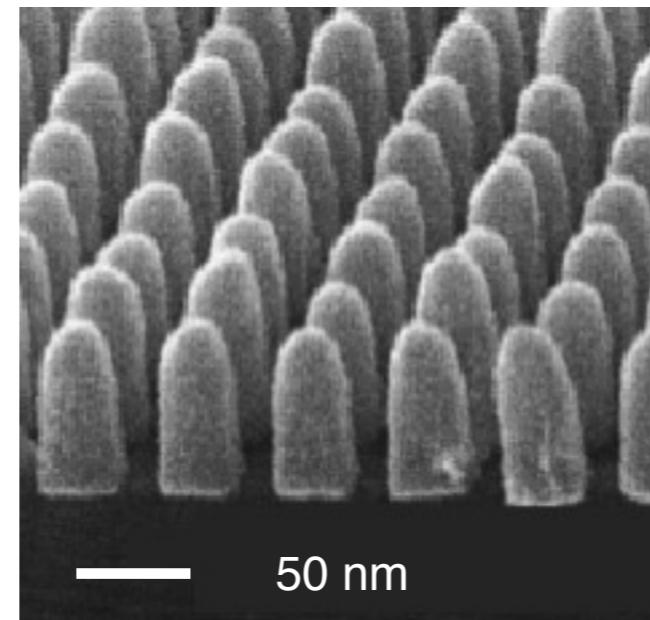
ナノ構造で発現する特異な磁性

- ・次元性の低下 ($3D \rightarrow 2D \rightarrow 1D \rightarrow 0D$)
- ・サイズ効果
- ・界面、粒界の効果

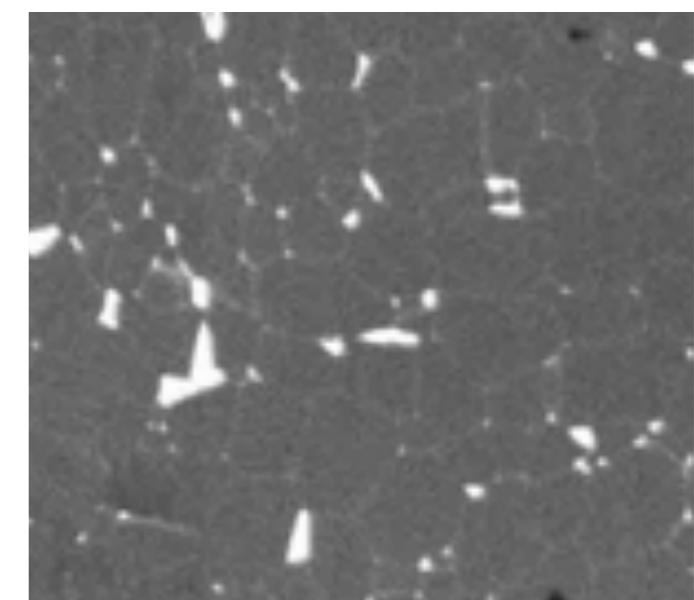
垂直磁気異方性 巨大磁気抵抗
超常磁性 高保磁力、B-H積



Au ナノ粒子



ビットパターン媒体



ネオジム焼結磁石

放射光光源

大型放射光施設 SPring-8 (= Super Photon Ring 8 GeV)

SPring-8 蓄積リング

SACLA X線自由電子レーザー

高輝度・パルス光・偏光X線

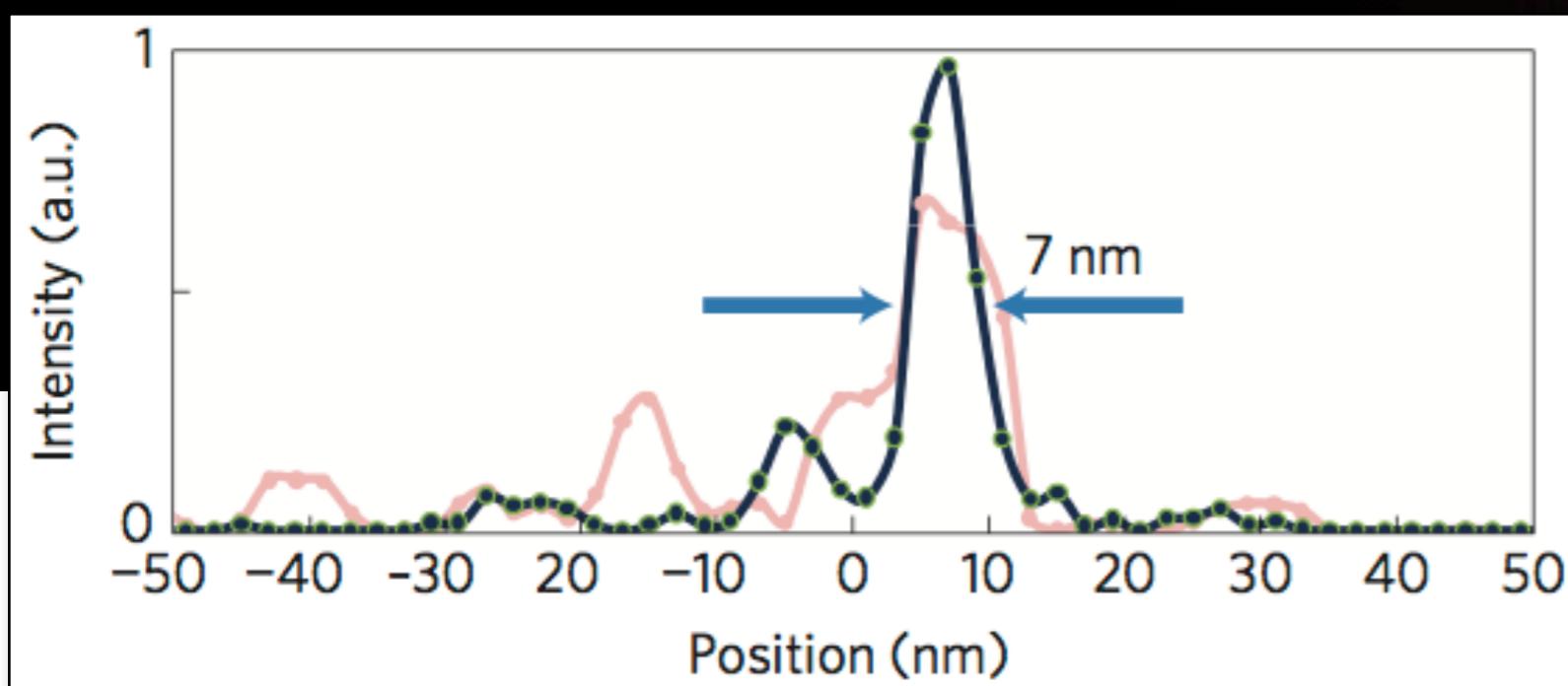
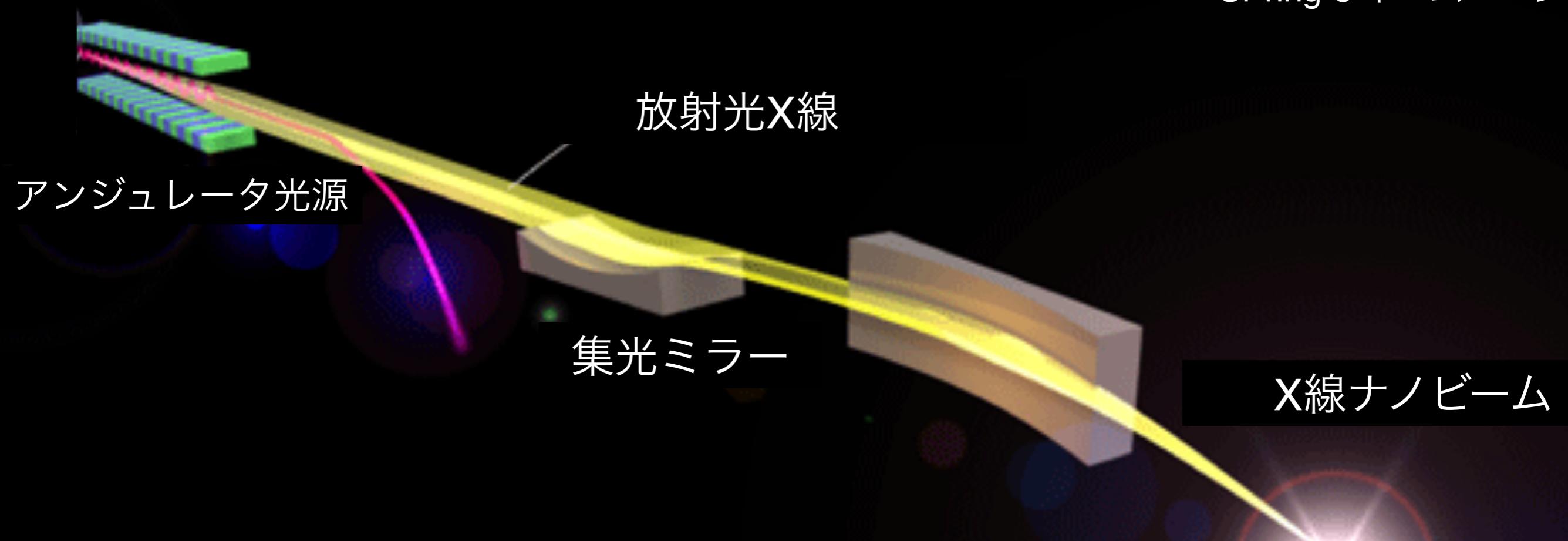
顕微・時分割

・磁性

1. 高輝度
2. 指向性が高い
3. 連続スペクトル(赤外～X線)
4. 偏光, 円偏光X線
5. パルス光

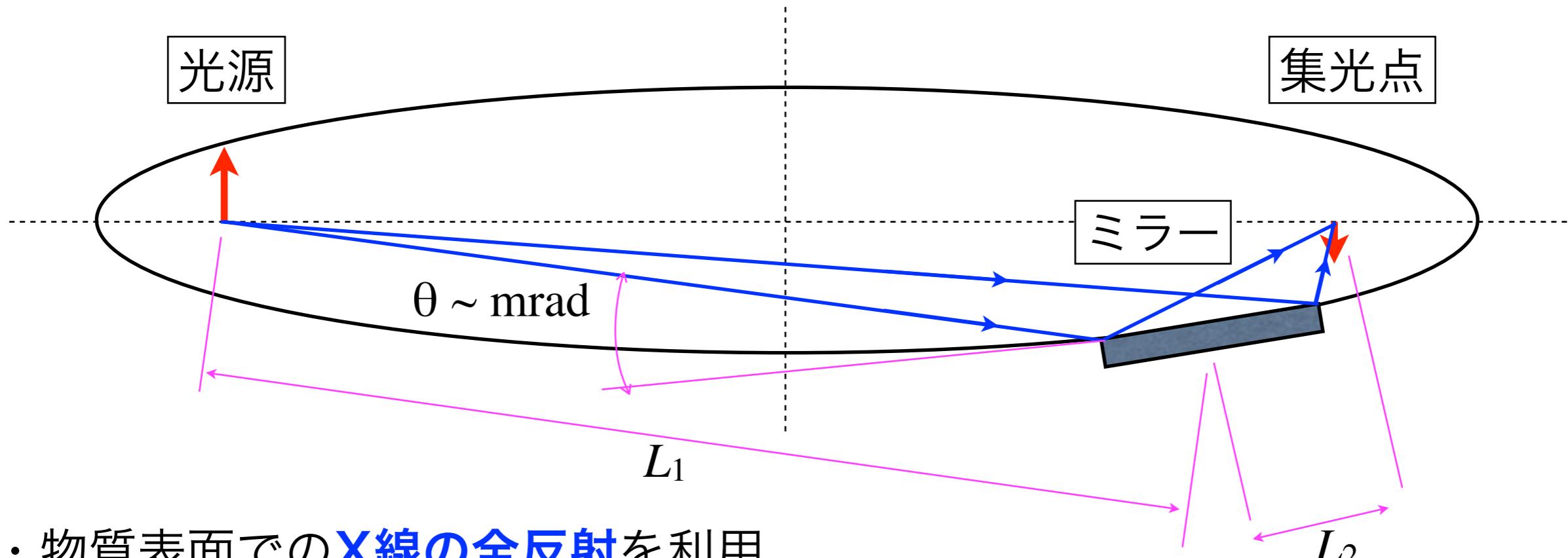
X線ナノビーム

SPring-8 ホームページ



世界最小径のX線ビーム
7 nm (@20 keV)

ミラーによるX線集光



- ・物質表面での**X線の全反射**を利用
- ・表面形状: 回転楕円面 (曲率半径 $R \approx 2L_2/\theta >$ 数10 m)
- ・材質: Si, 石英など, 表面にPt膜などをコート

・縮小比: $M = L_2/L_1$
 $L_1 = 10 \text{ m}, L_2 = 0.1 \text{ m} \rightarrow$ 光源を1/100に縮小

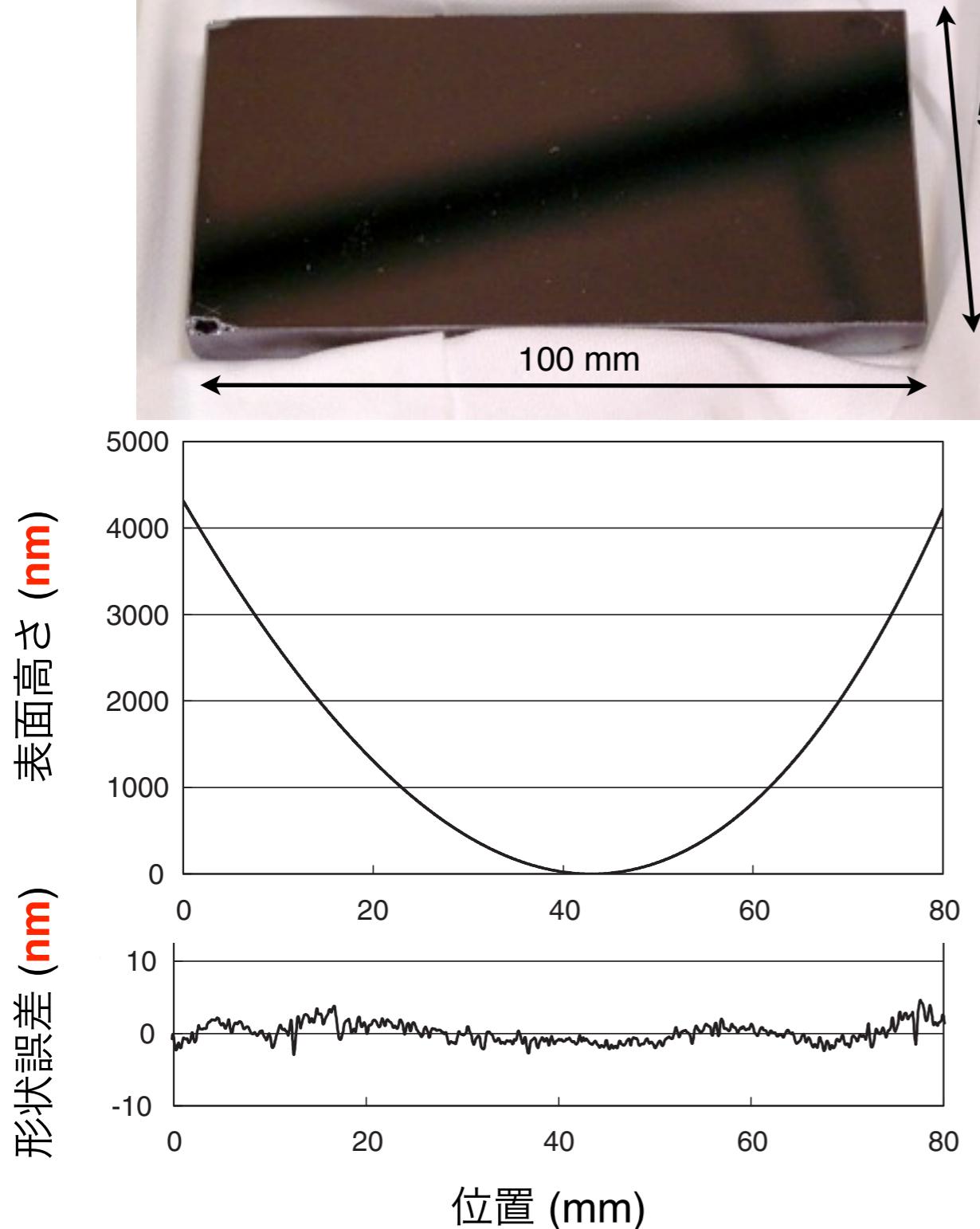
(仮想)光源サイズ $10 \mu\text{m} \rightarrow$ 集光サイズ 100 nm

*異なるX線エネルギーに対しても焦点距離は一定

*高エネルギー(数10 keV以上)では効率が低下

X線集光ミラー

阪大工学部 精密工学研究科 山内研究室が開発

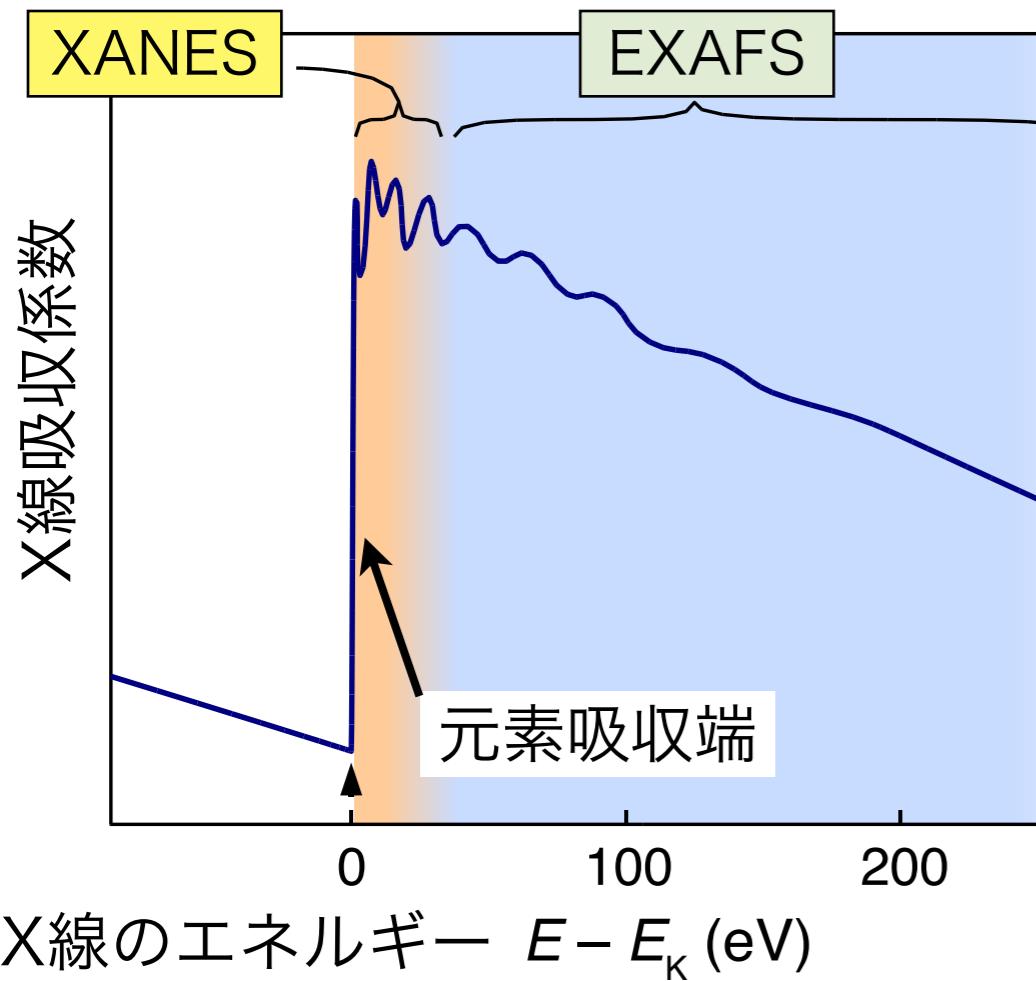


ミラーの仕様

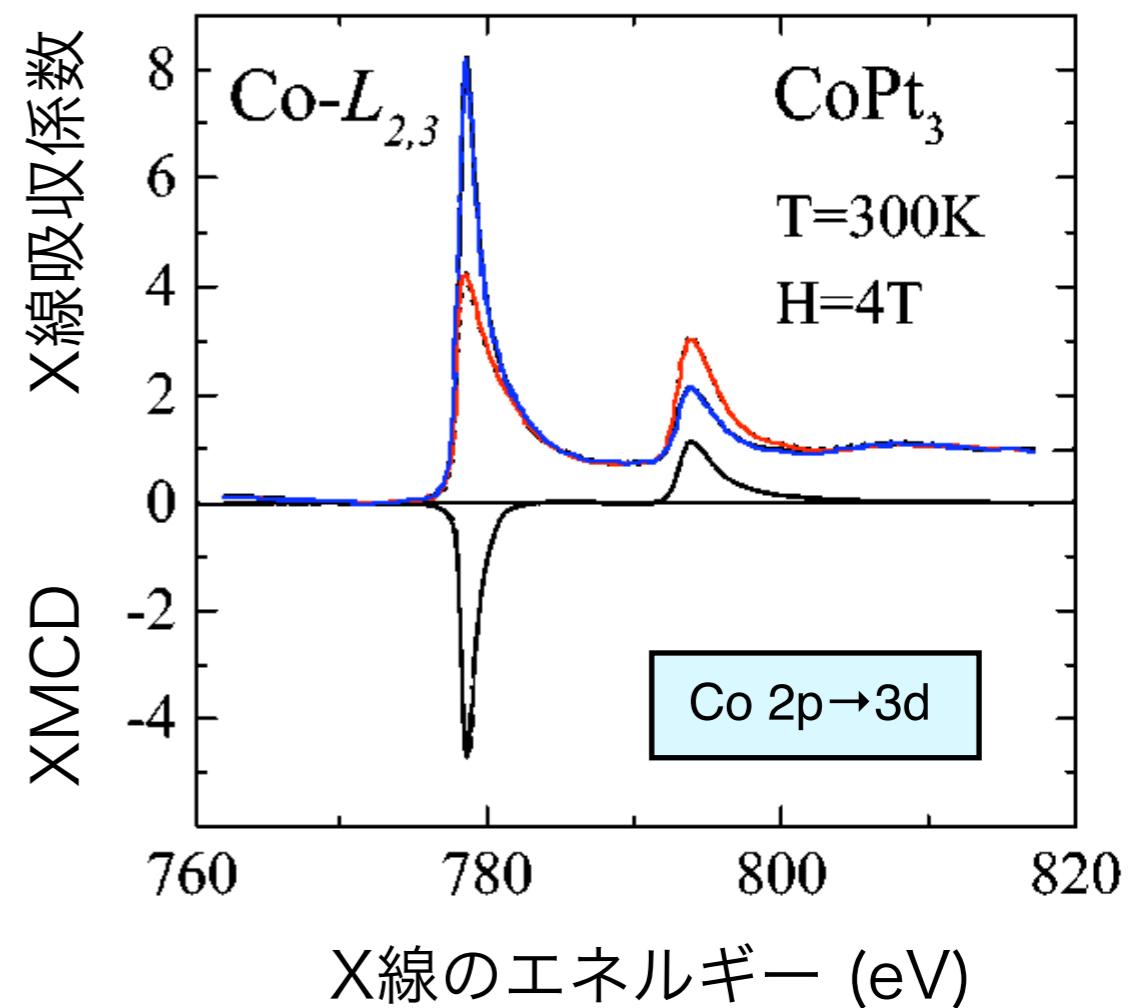
材質	シリコン
コート材	なし
ミラー長さ	100 mm
反射面の形状	楕円筒面
研磨方法	Elastic emission machining
形状誤差	6.0 nm (P-V) 0.3 nm (rms)
焦点距離	300 mm (ミラーA) 150 mm (ミラーB)
視斜角	1.4 mrad (ミラーA) 1.8 mrad (ミラーB)
開口サイズ	140(垂直)X180(水平) μm

X線吸収分光法

XAFS: X線吸収端微細構造



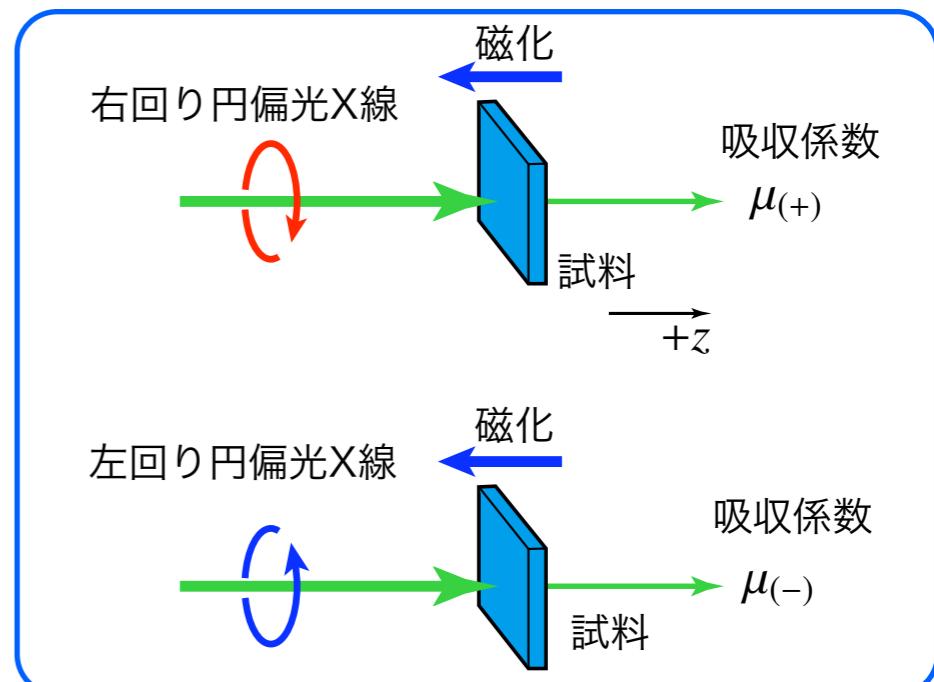
XMCD: X線磁気円二色性



- 電子状態、化学状態
- 局所構造、結合・対称性
- 磁気モーメント
- 磁気異方性

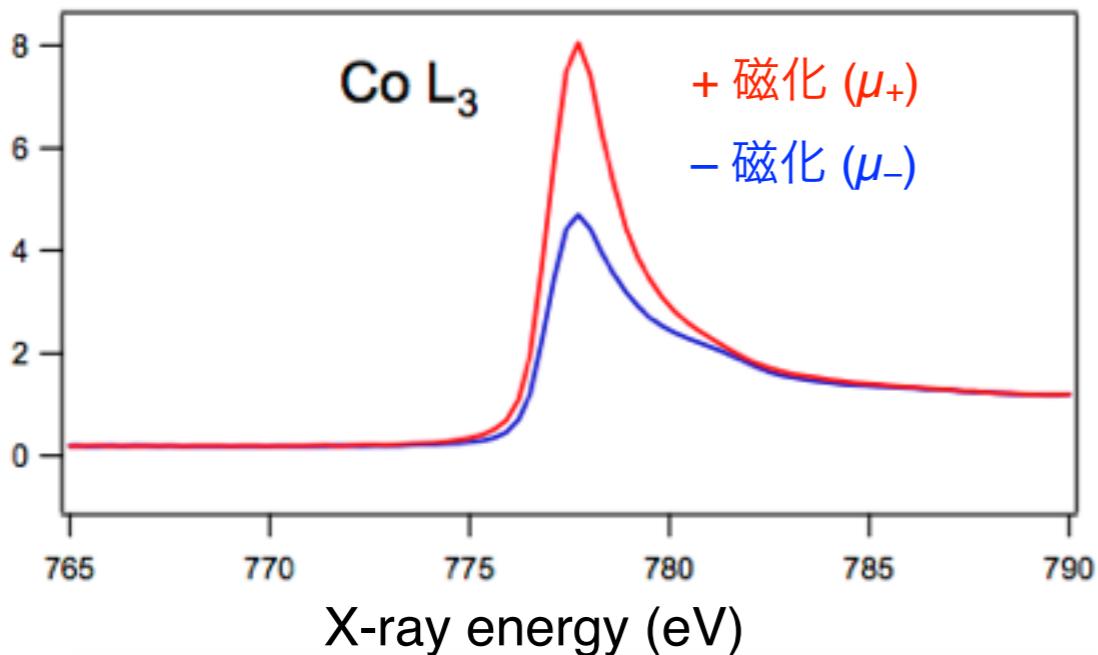
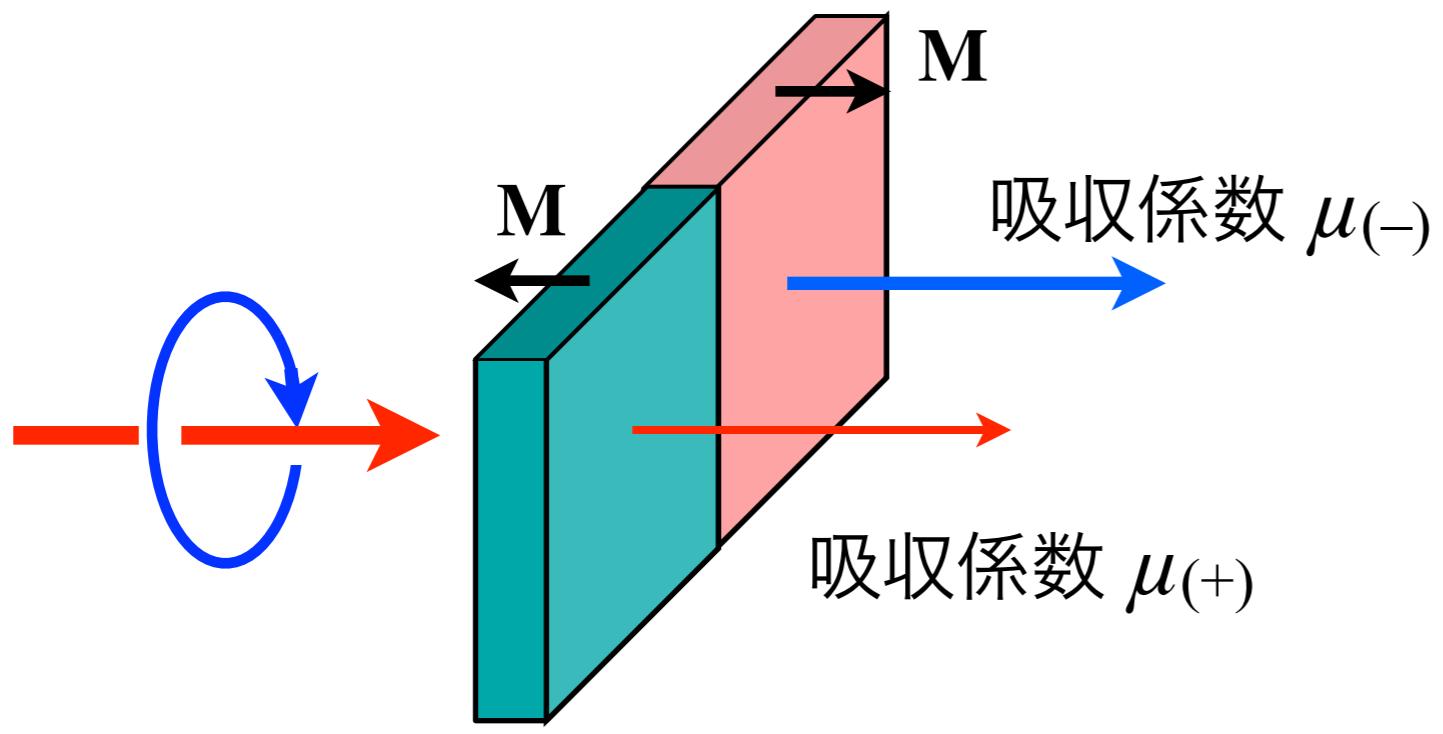
- 元素選択性
- バルク敏感性
- 真空不要
- 外場中測定

単結晶, 多結晶, 非晶質, 薄膜, 液体, 生体



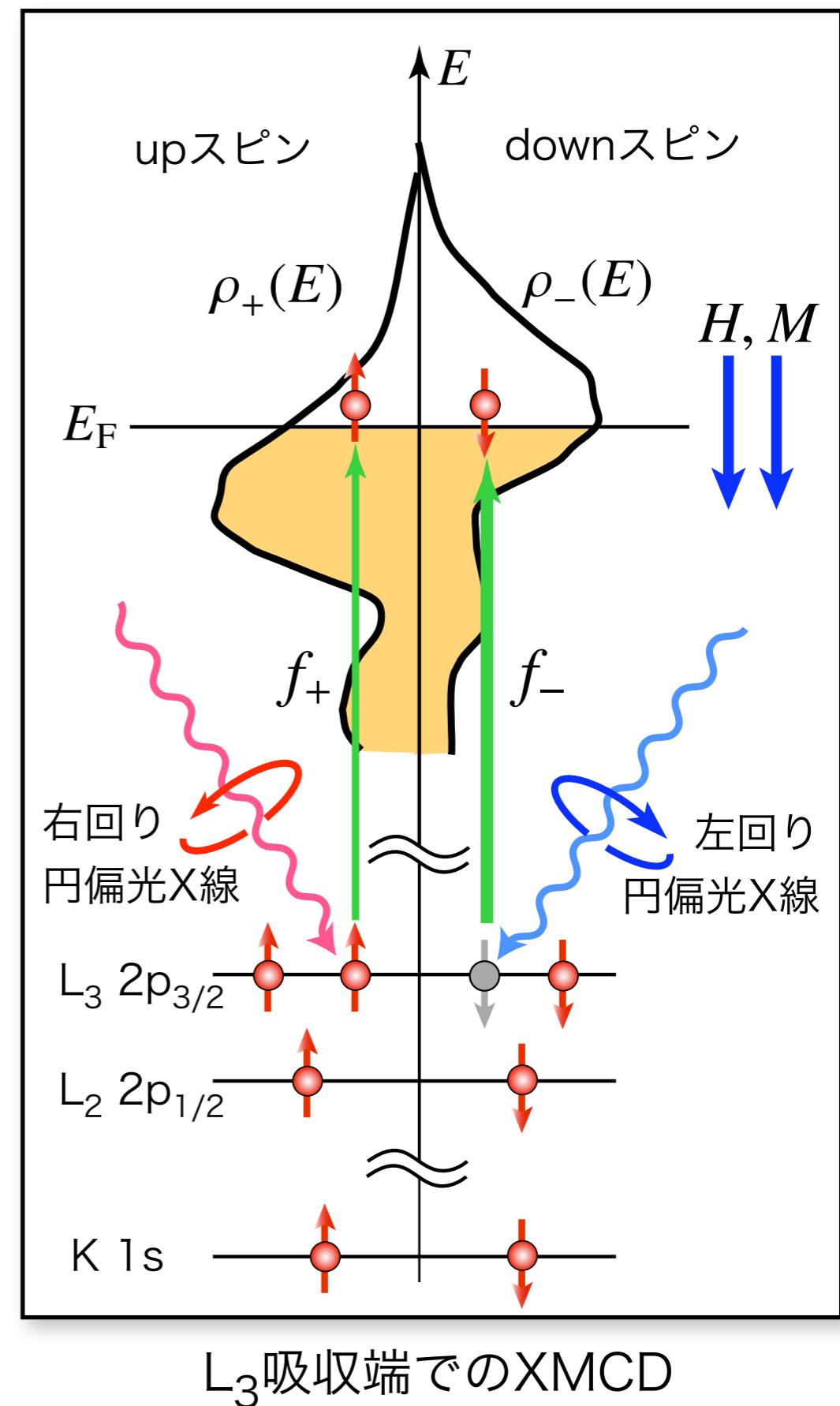
X線分光で磁性を見る

X線磁気円二色性 (XMCD)



X-ray magnetic circular dichroism
(XMCD)

$$\Delta\mu = \mu_{(+)} - \mu_{(-)}$$



XMCD (X線磁気円二色性) 測定

XMCD (X線磁気円二色性, X-ray magnetic circular dichroism)

→ 円偏光X線による分光法 (磁気的XAFS)

得られる情報

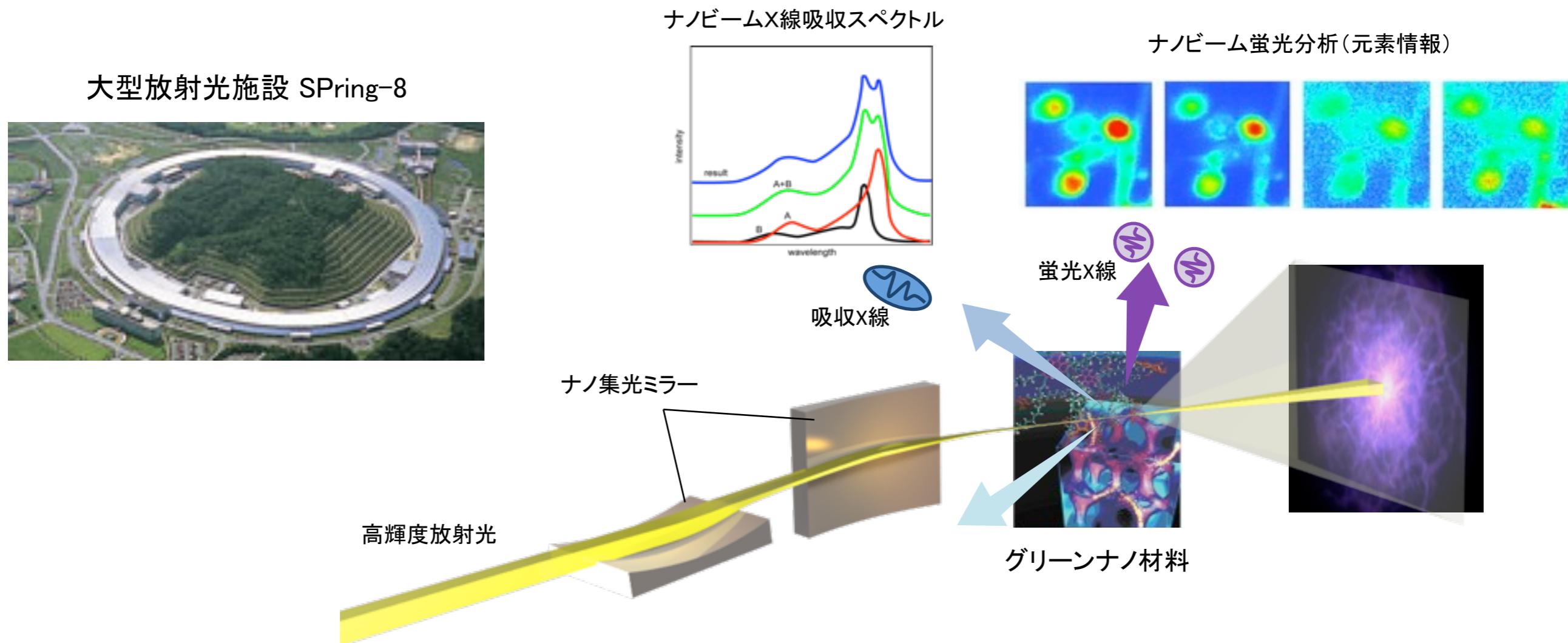
- ▶ 原子一個あたりの磁気モーメント (スピン・軌道)
- ▶ 磁気異方性
- ▶ 元素選択的な磁化曲線 = XMCDの磁場依存性

測定の特色

- ▶ 元素選択性
- ▶ 高感度 (< 1 ML)
- ▶ 強磁場 (> 10 T)、高圧 (~200 GPa)

グリーン・ナノ放射光分析評価拠点 (2010年度整備)

- SPring-8の高輝度放射光を100 nmスケールに集光
- ナノXAFS分析 (BL39XU)、ナノ蛍光X線分析 (BL37XU) を整備
- 次世代グリーンナノテク創成に向けた研究支援のためのサテライト拠点を形成

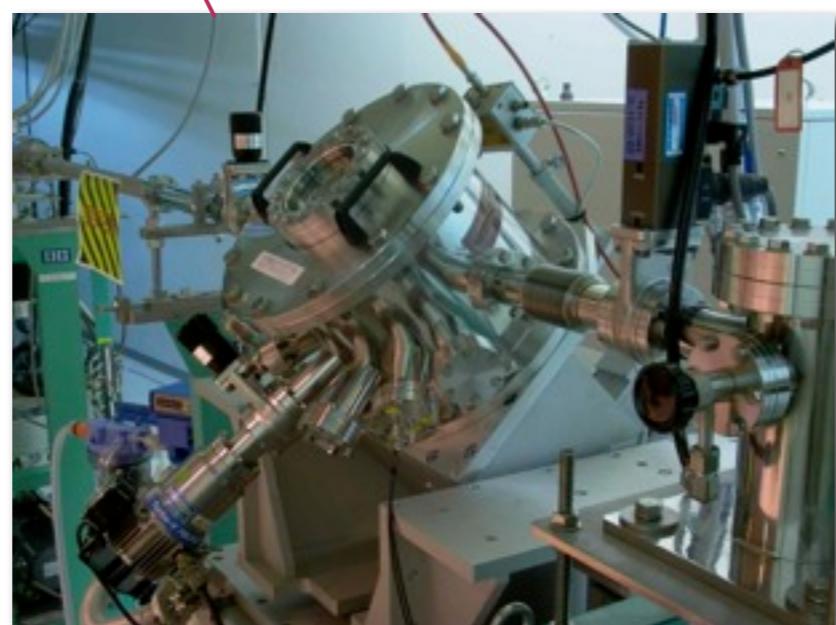
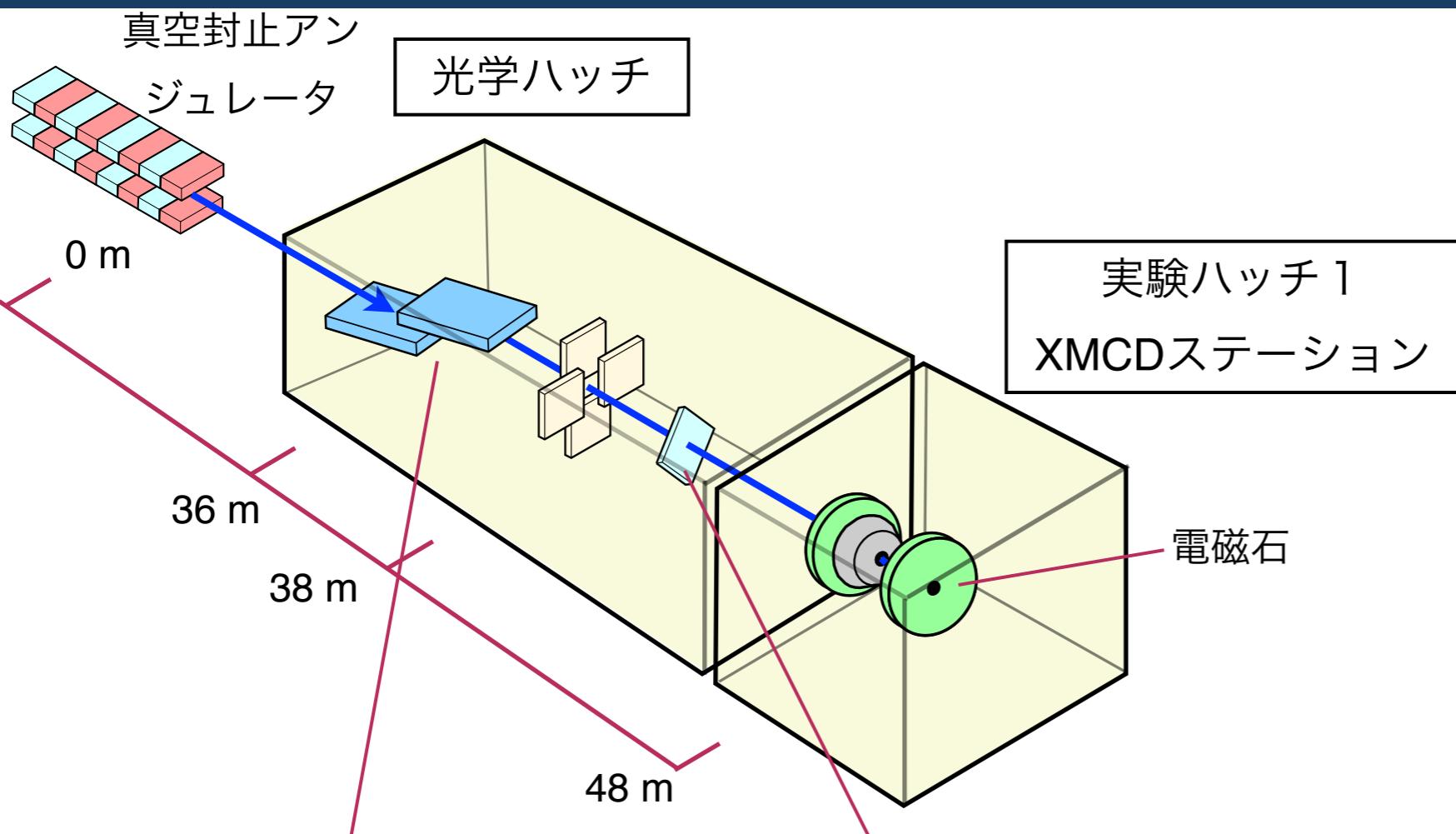


文部科学省「低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワーク整備事業」
グリーン・ナノ放射光分析評価拠点 (独立行政法人理化学研究所、研究グループリーダー 石川哲也)

石川哲也、高田昌樹、山本雅貴、後藤俊治、小山貴久、湯本博勝、寺田靖子、鈴木基寛、河村直己、水牧仁一朗、成山展照、
松下智裕、石澤康秀、古川行人、大端通、山崎裕史、竹内智之、仙波康徳、松崎泰久、田中政行、清水康弘、岸本輝、
三浦孝紀、竹下邦和、宇留賀朋哉、藤原明比古、大橋治彦

<http://www.nims.go.jp/lcnet/participation/spring8.html>

BL39XU, SPring-8 (1997~)

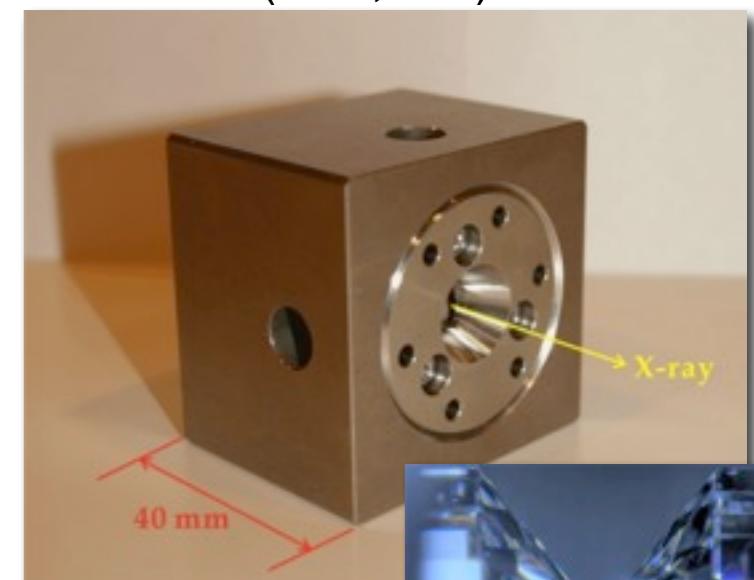


ダイヤモンドX線移相子

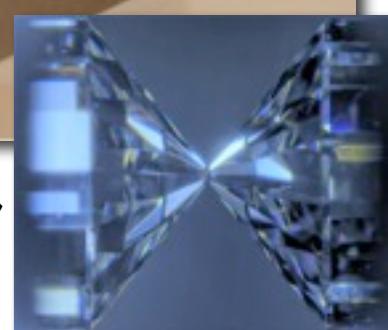
偏光制御 (円偏光、垂直直線偏光)



10 T 超電導マグネット
(10 T, 2 K)



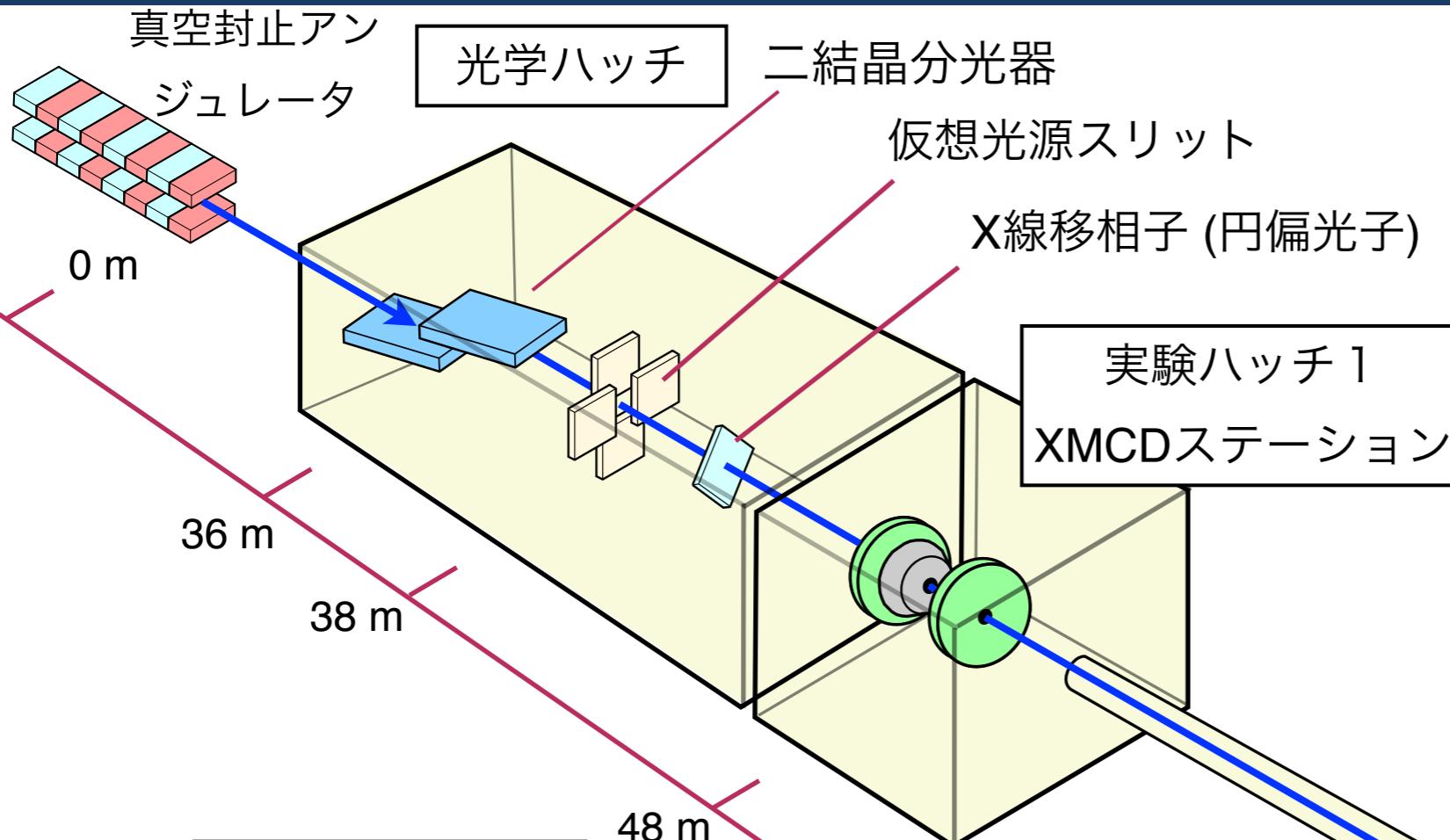
ダイヤモンドアンビルセル
(~170 GPa)



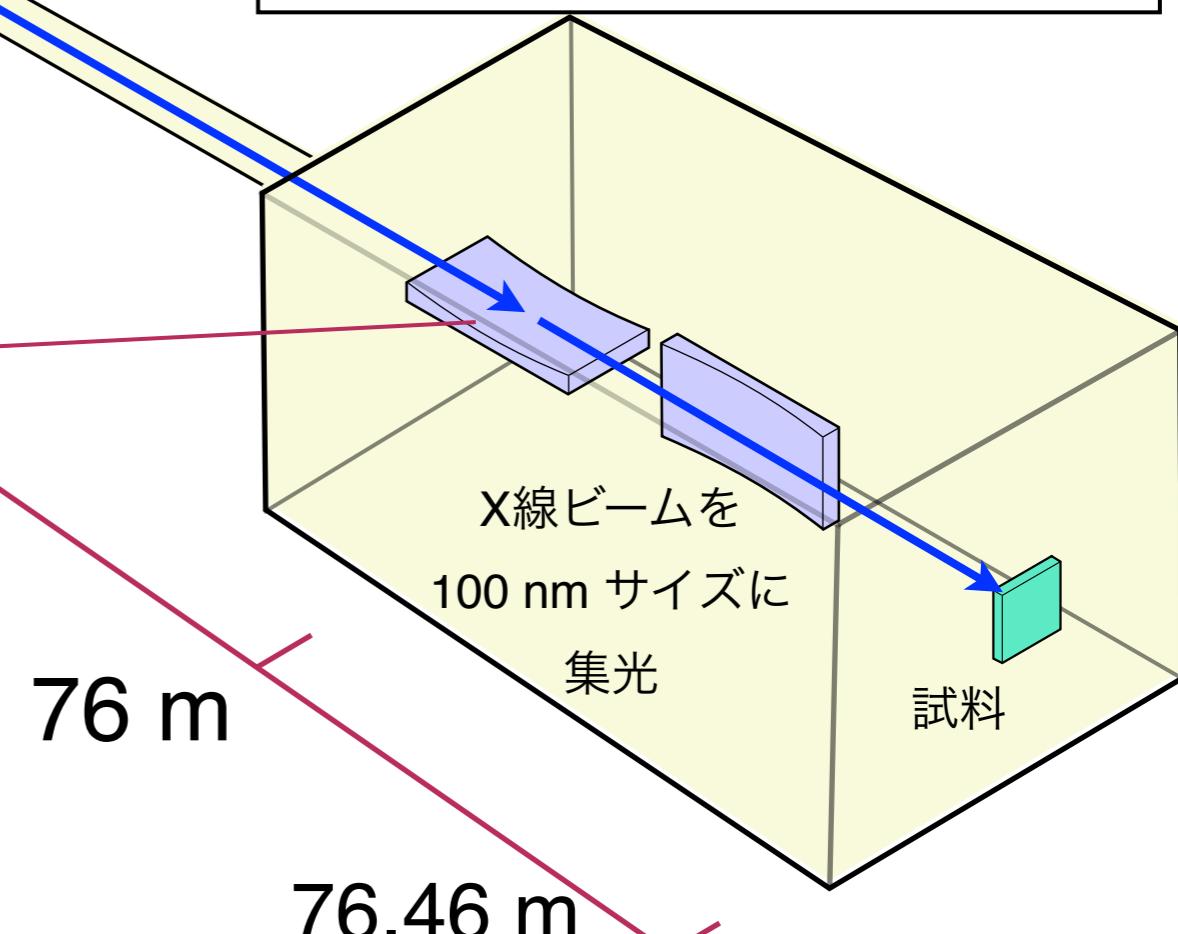
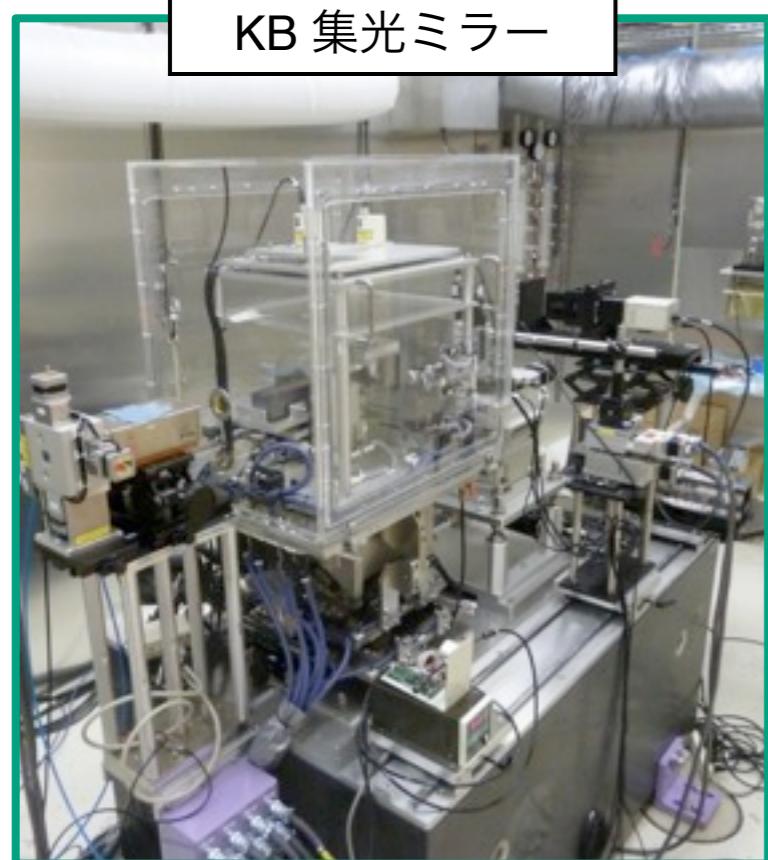
BL39XU X線ナノ分光ステーション

新設実験ハッチ

(光源から76 m、精密空調)



実験ハッチ2
ナノ分光ステーション

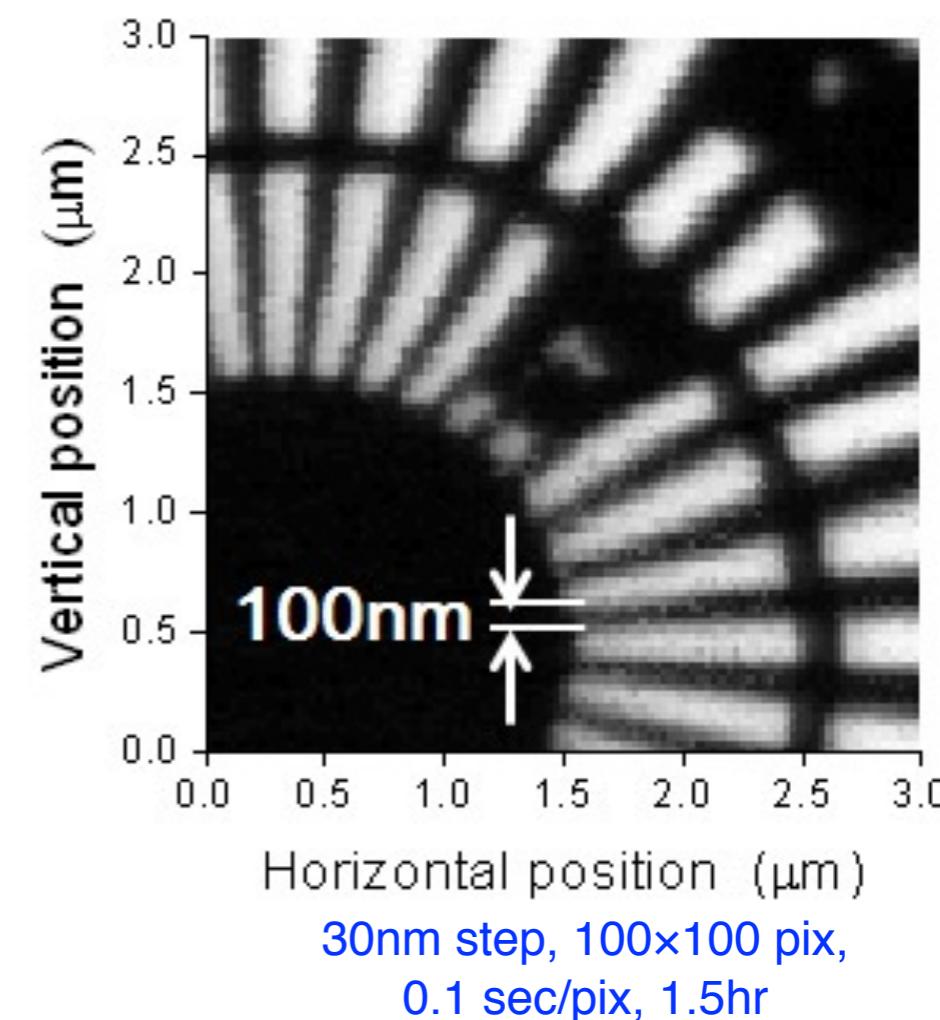
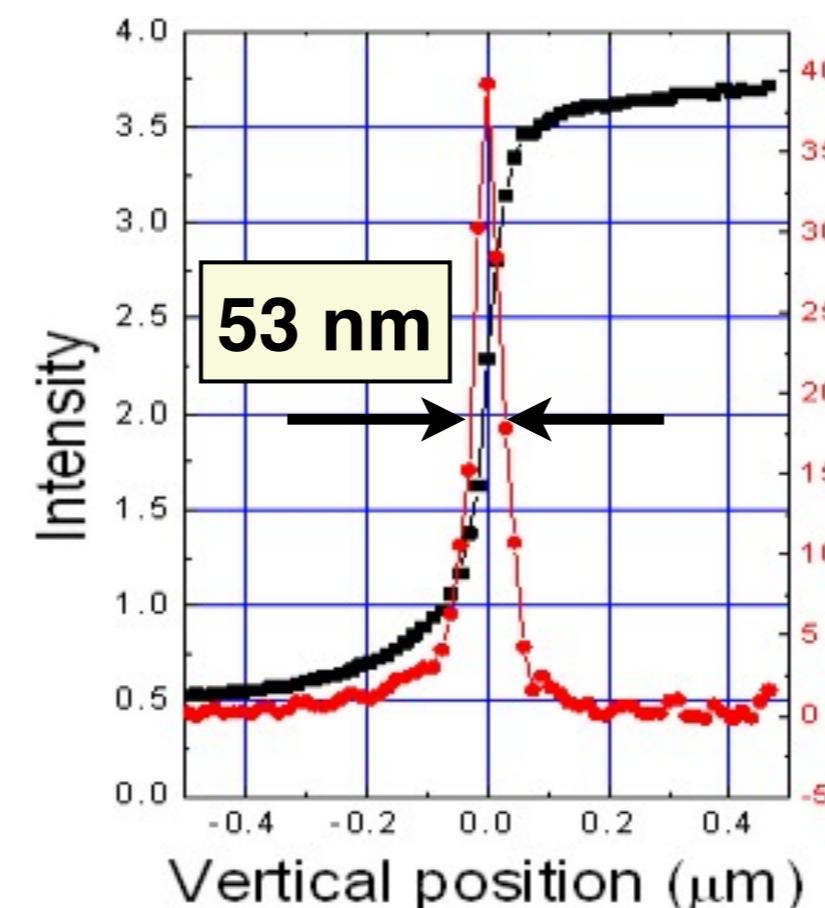
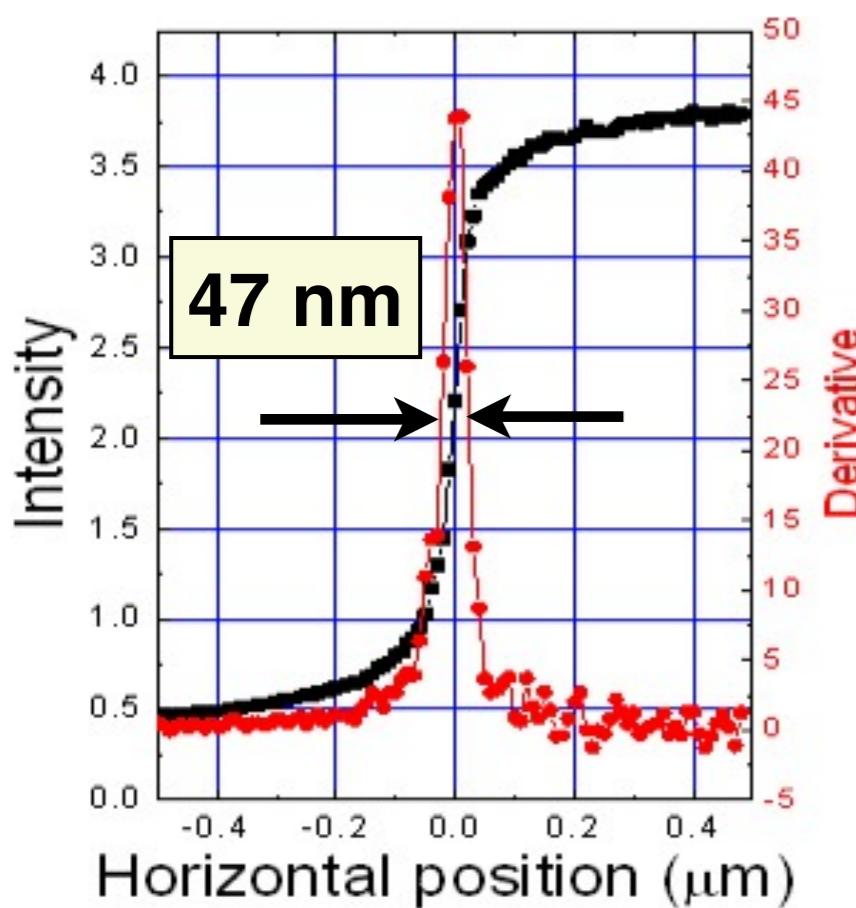


SPring-8 BL39XU

集光X線ビーム

	高分解能モード	高fluxモード
X線エネルギー	5~15 keV	
ビームサイズ (typical)	100(V)×100(H) nm	300(V)×250(H) nm
光子flux*	6.2×10^9 photons/s	1.7×10^{12} photons/s

*values at 11.56 keV



X線ナノ分光ステーションで可能となる測定

100 nm 空間分解能でのXAFS、XMCD 測定

ナノXAFS

XAFSの二次元マッピング

化学状態、結合状態、対称性等
の空間分布

局所XANES, 局所EXAFS

ナノ構造をもつ試料上の特定部位
単一ナノ粒子等の構造解析

ナノXMCD

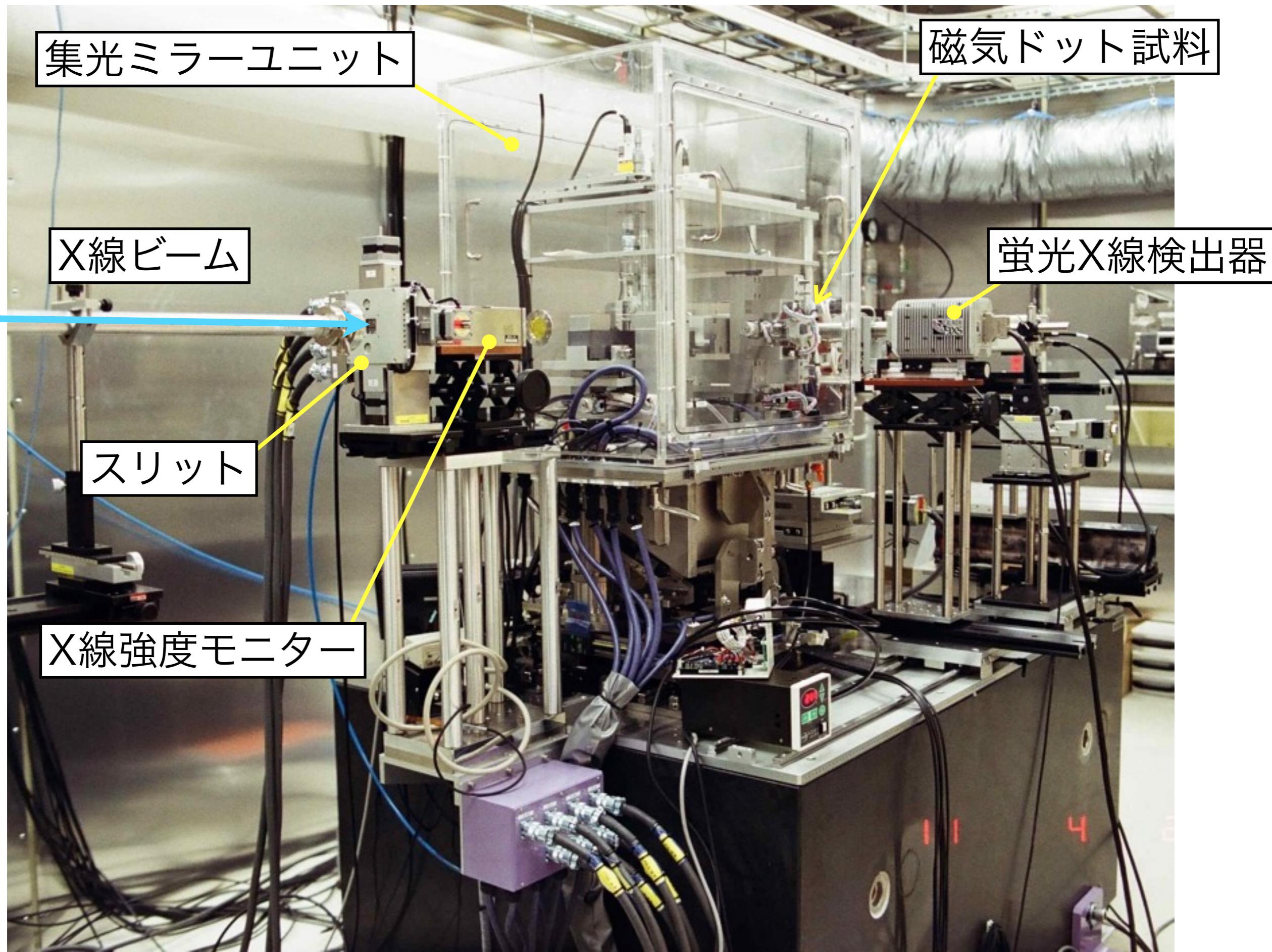
XMCDマッピング

元素選択的磁気イメージング
バルク磁化
外部磁場下 (< 2.2 T)

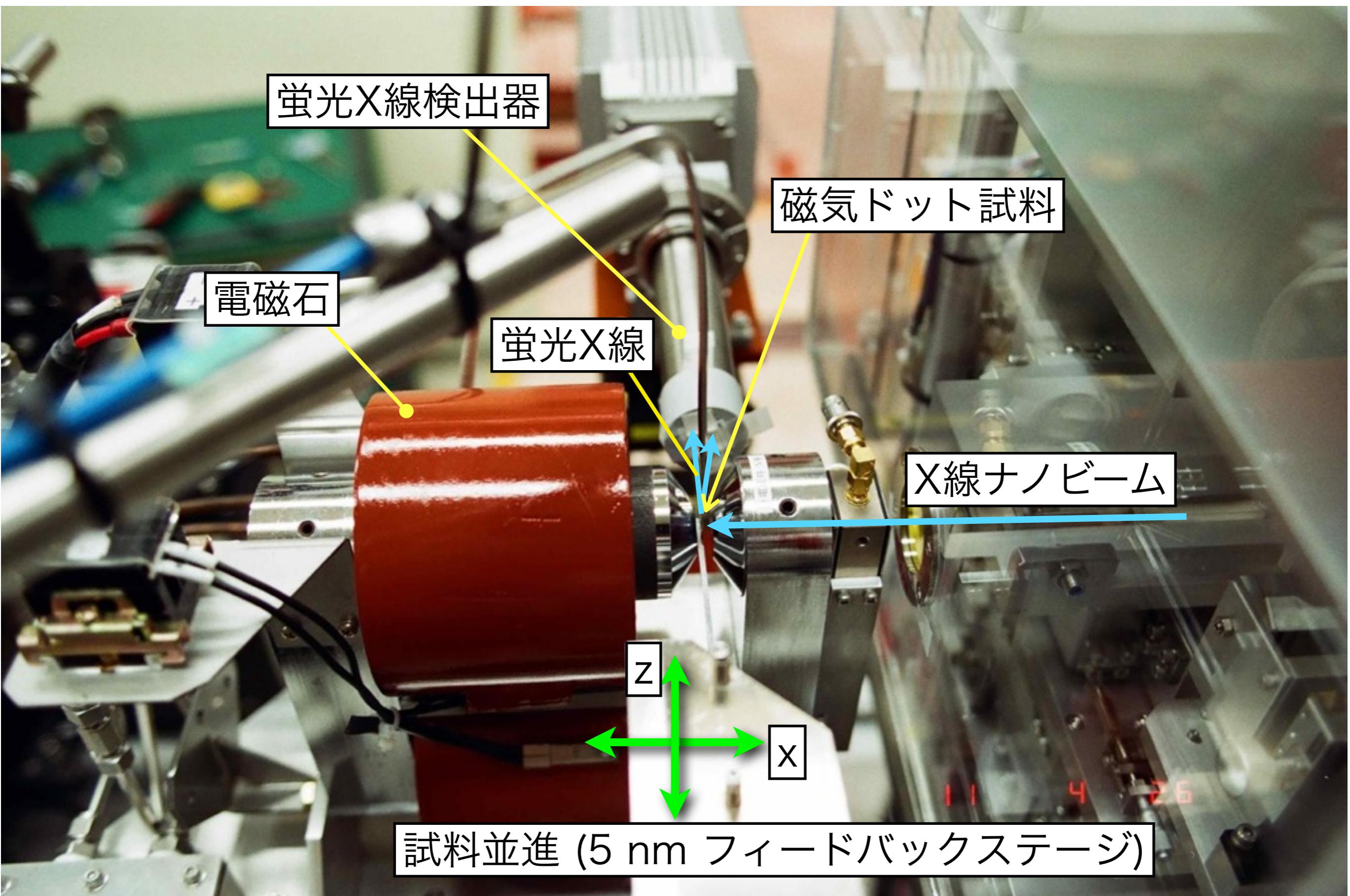
局所XMCD, 元素別磁化曲線

单一磁気デバイス素子の解析
磁性粒を特定した磁気解析

実験装置

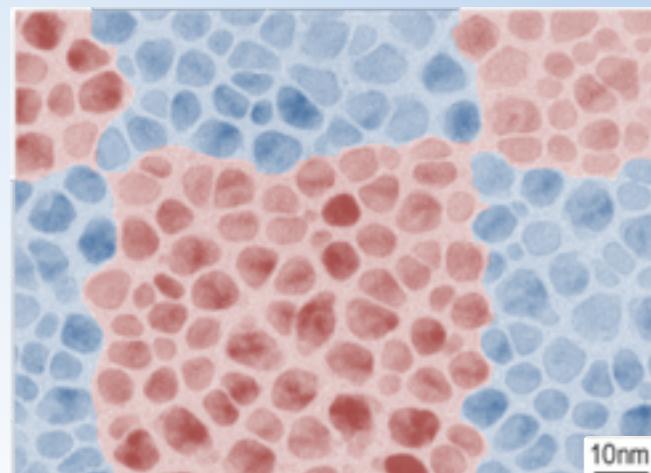


実験装置 試料まわり

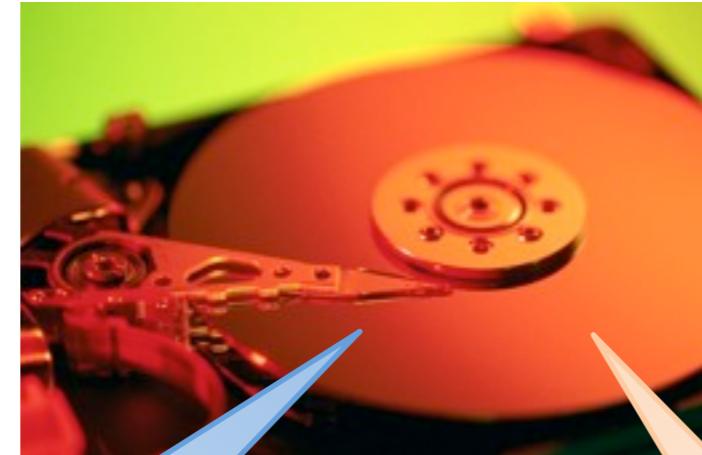


次世代テラビット磁気記録：ビットパターン媒体

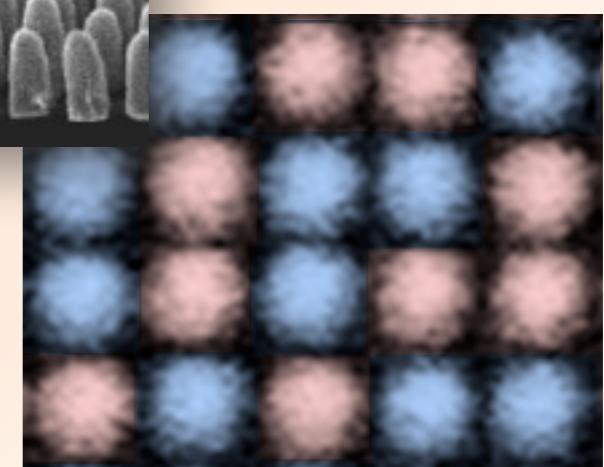
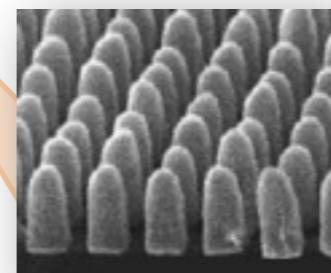
従来：グラニュラー媒体



1 : 上向き磁化
0 : 下向き磁化



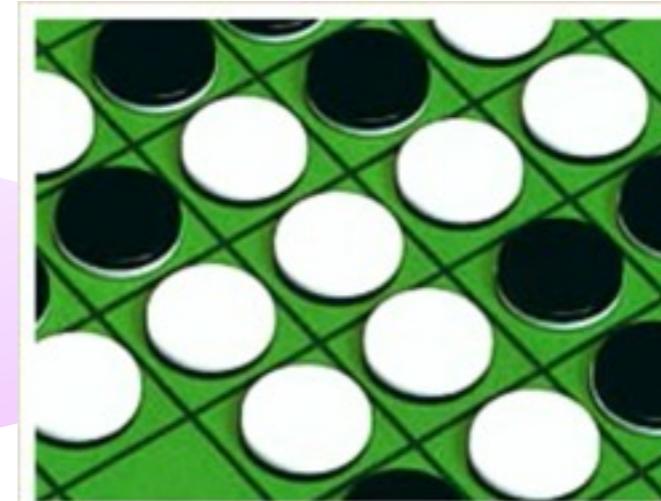
次世代超高密度記録
 $\gg 1 \text{ T bit/inch}^2$



1 : 上向き磁化
0 : 下向き磁化

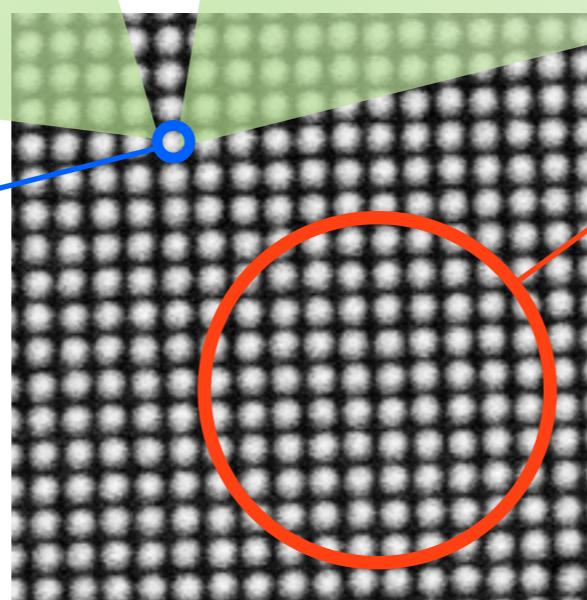
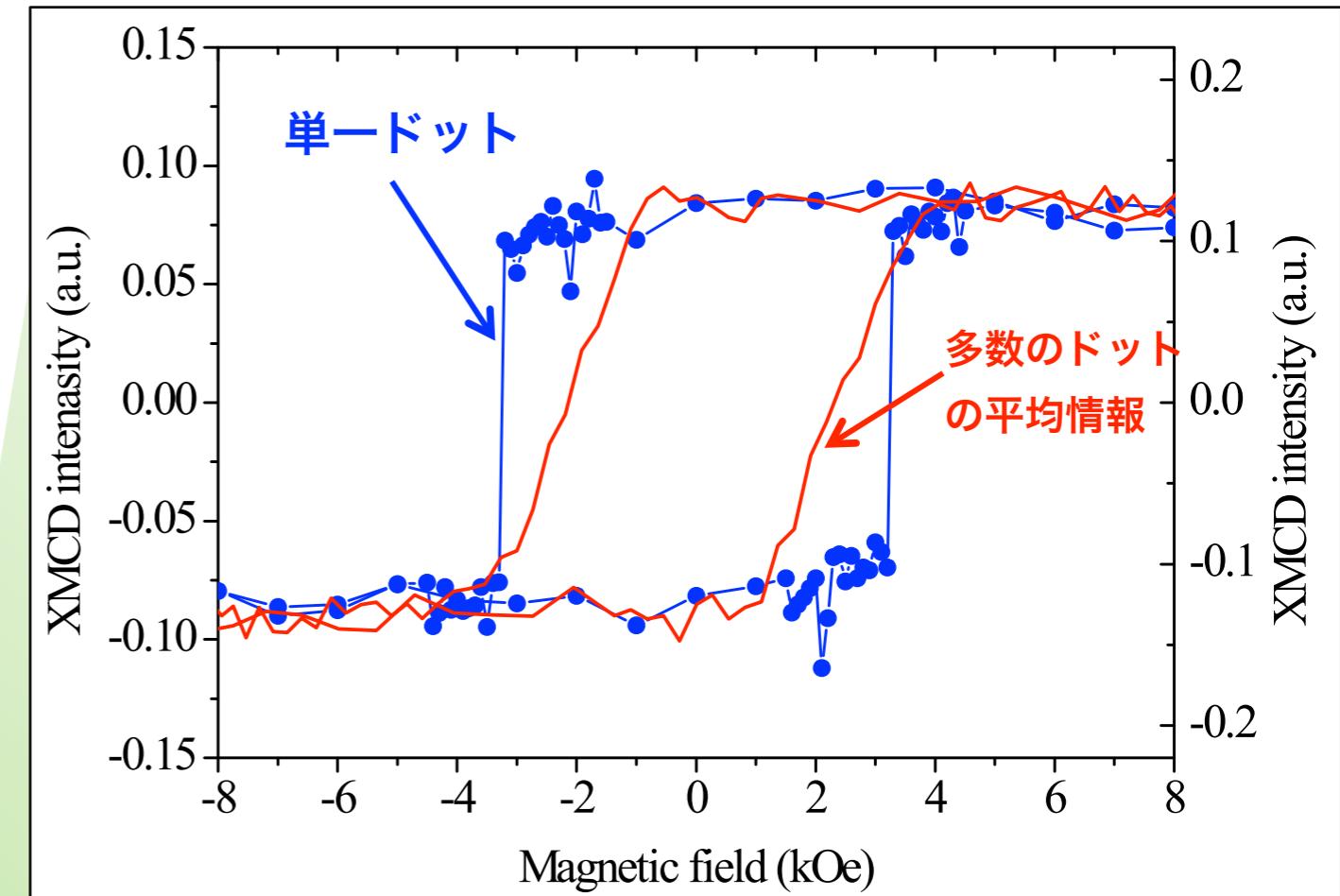
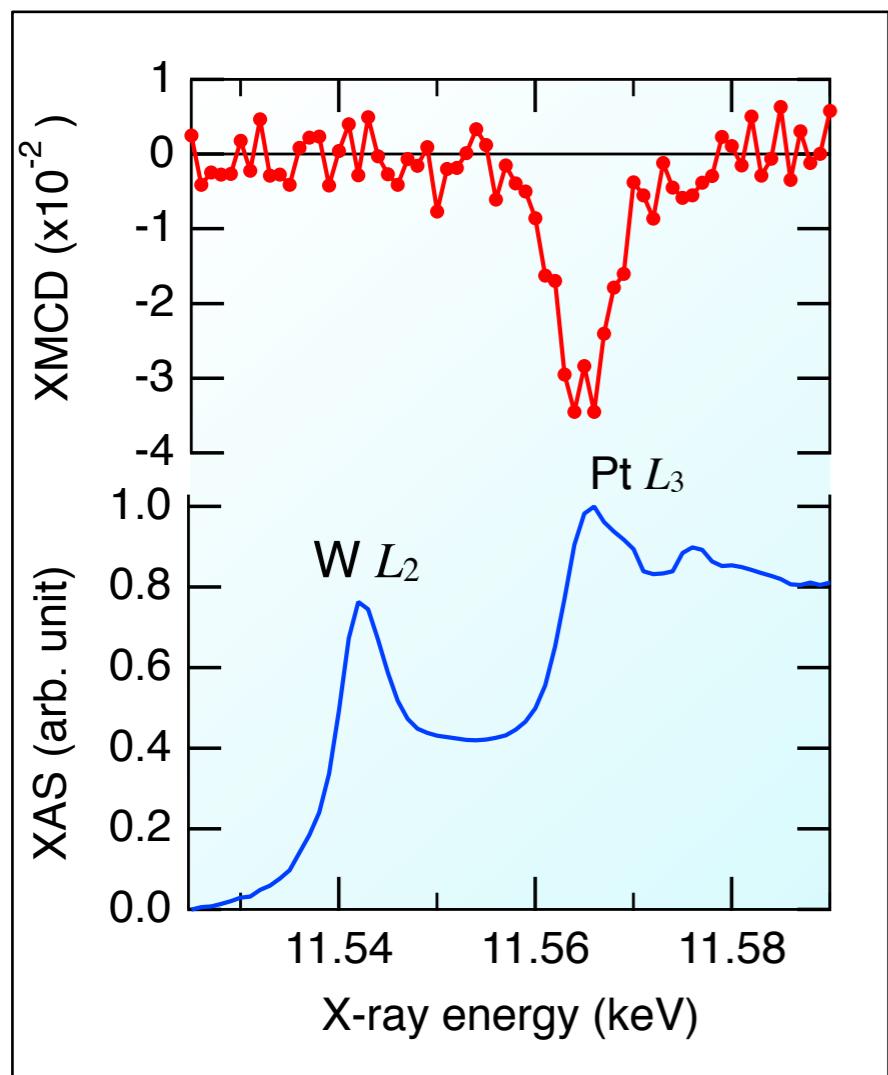


個々の磁気ドットの磁気特性
磁化反転過程？



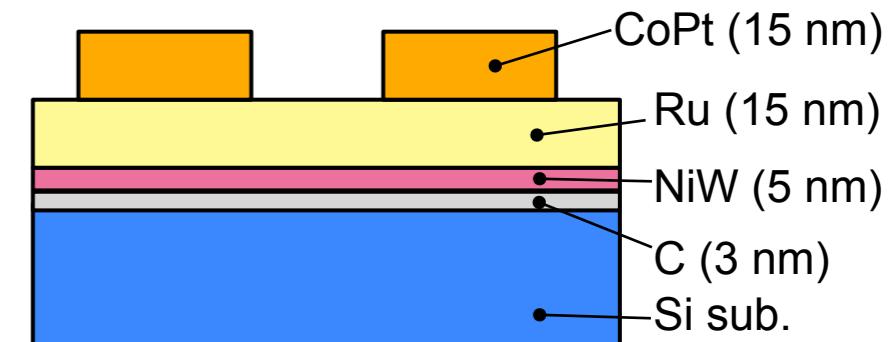
单一磁気ドットのXMCD磁化測定

ナノXMCDによって、单一磁気ドットの急峻な磁化反転過程が明らかに

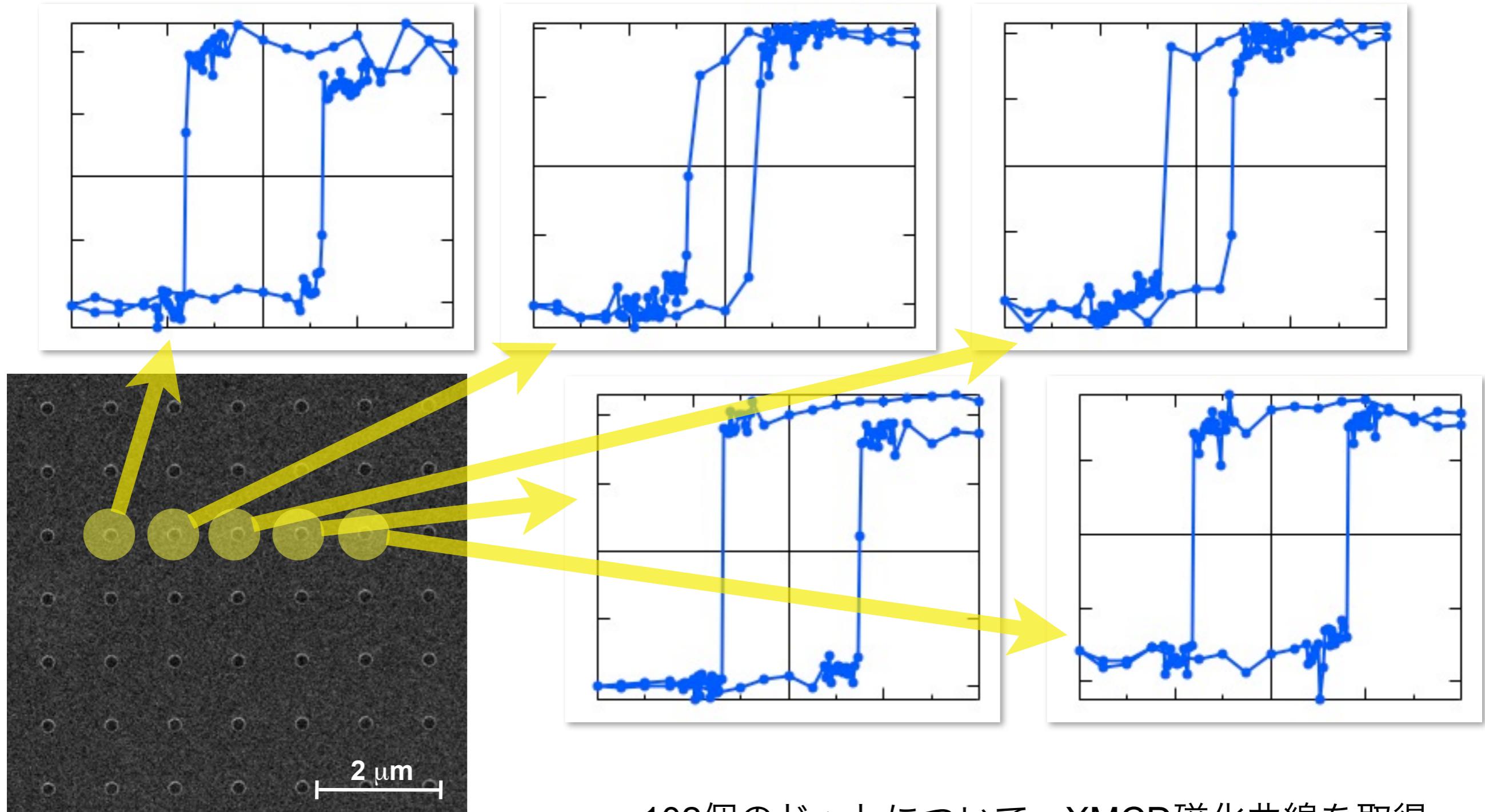


300 nm 集光ビーム
(新設ステーション)
ビットパターン媒体：
Co₈₀Pt₂₀ 磁気ドット
($\phi 200$ nm, t = 15 nm)

マイクロビーム
(既存の集光ミラーによる結果)



X線ビーーム位置を走査→つぎつぎにドットを測定

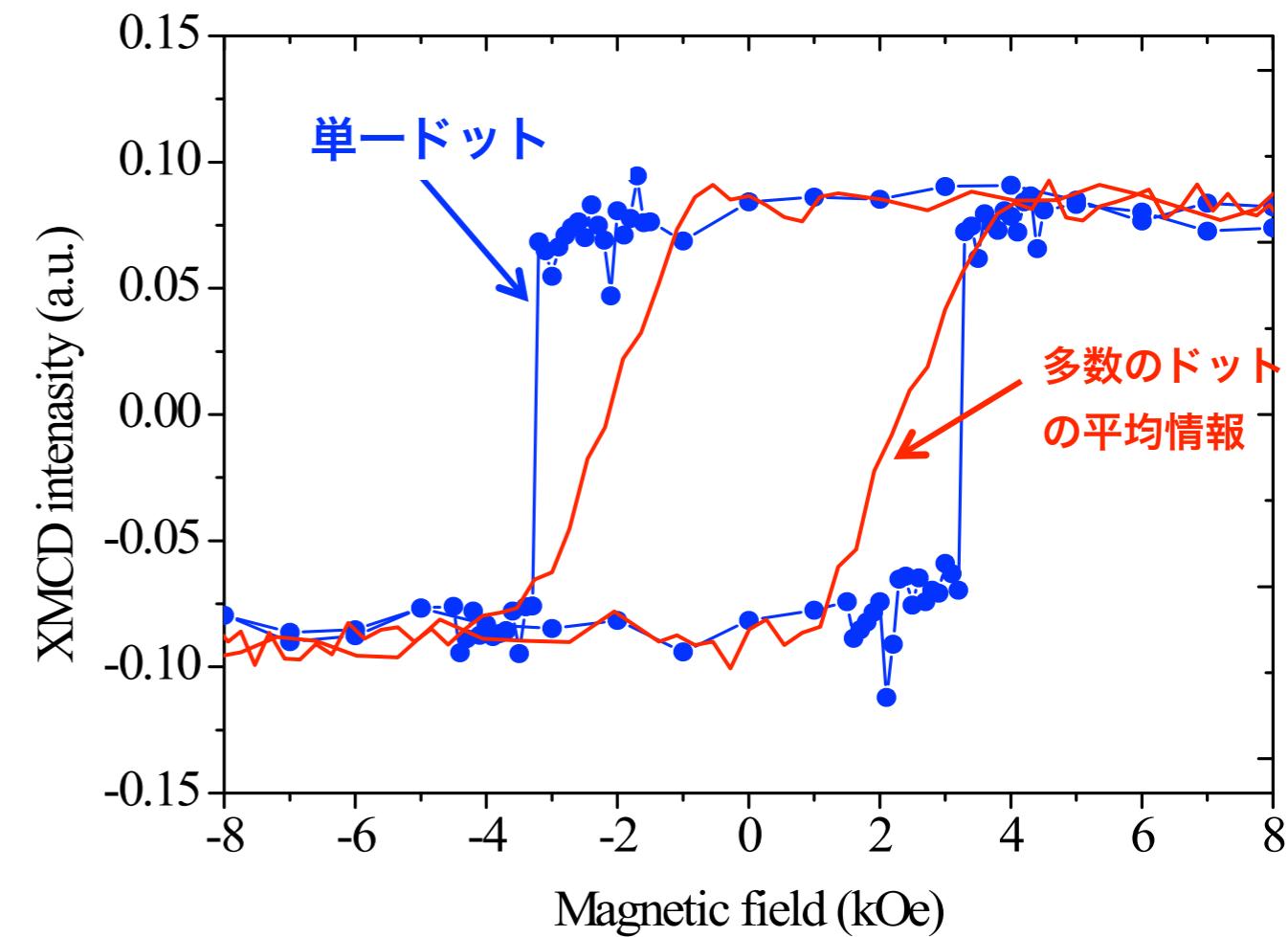
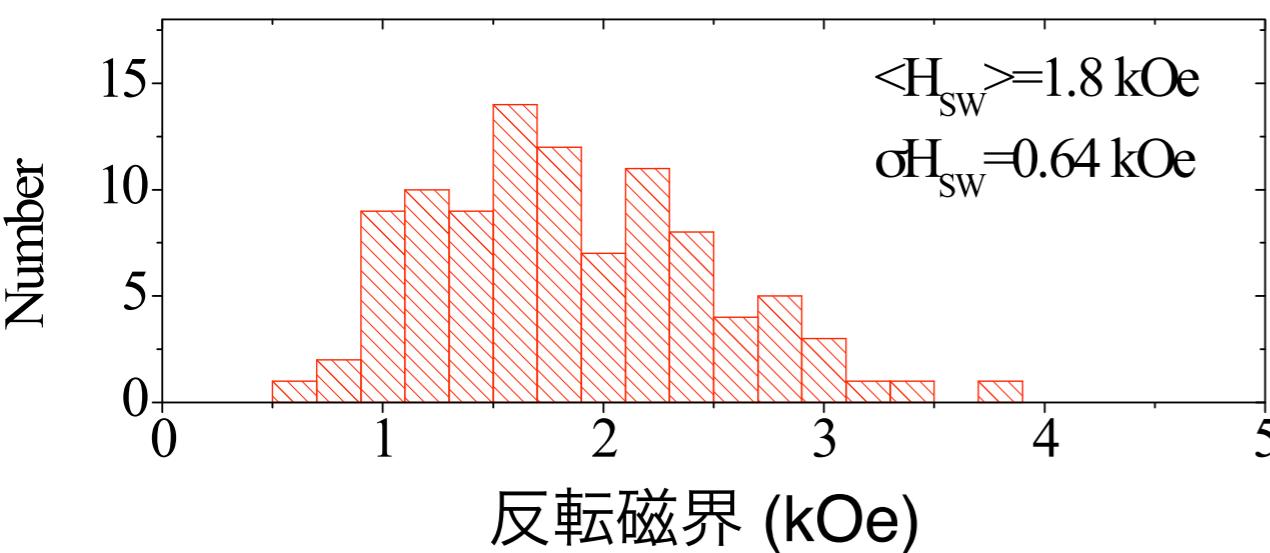
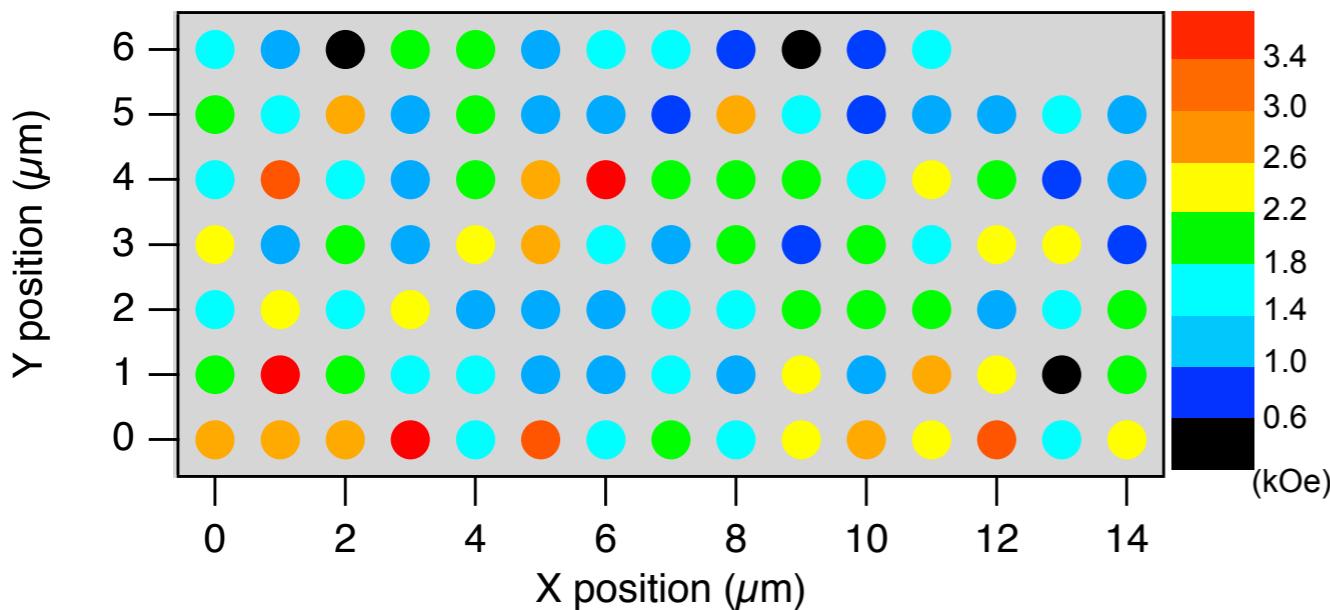


102個のドットについて、XMCD磁化曲線を取得

測定時間: 30分/ドット

多数ドットについて、個別の磁気特性を評価

ドットごとの反転磁界の分布

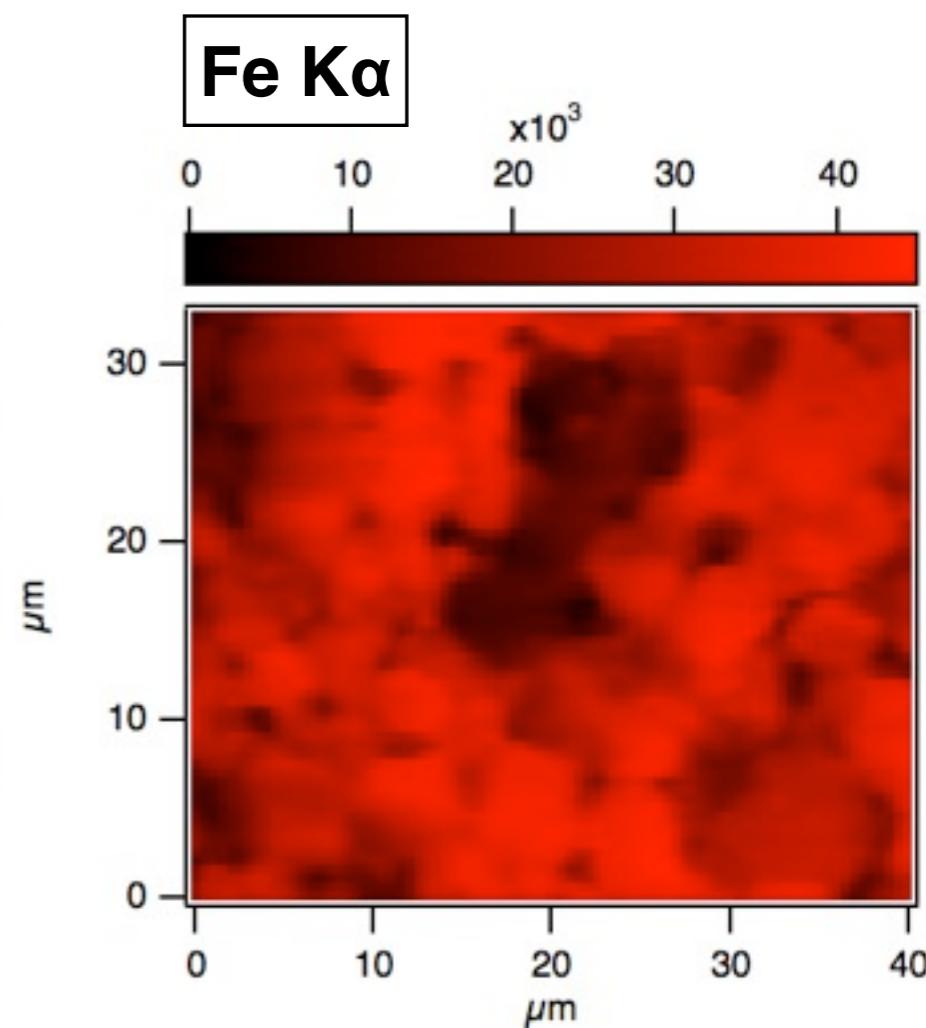
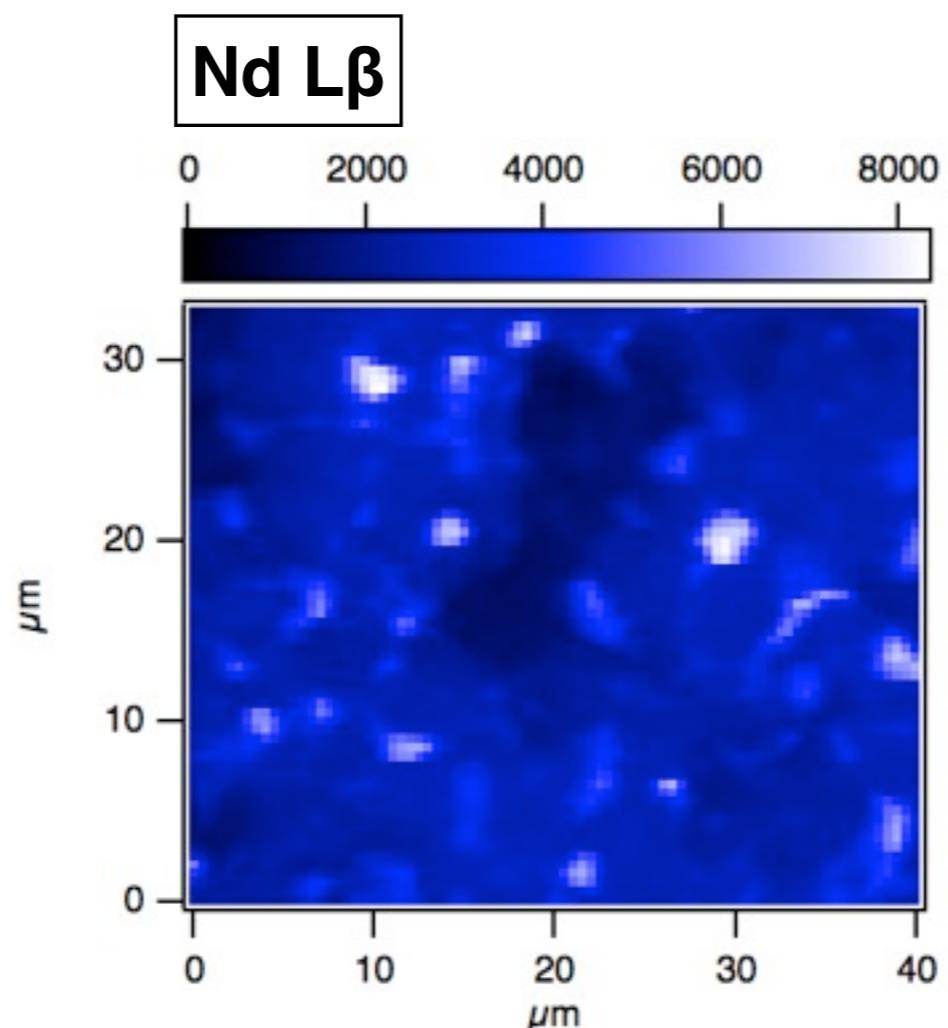
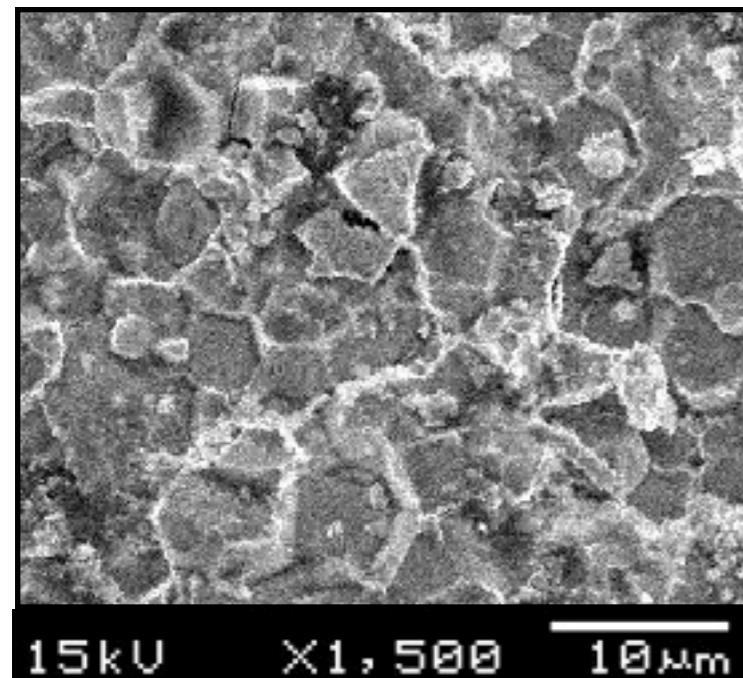


直径200 nm の磁気ドットの磁気特性を個別に評価 → 統計解析

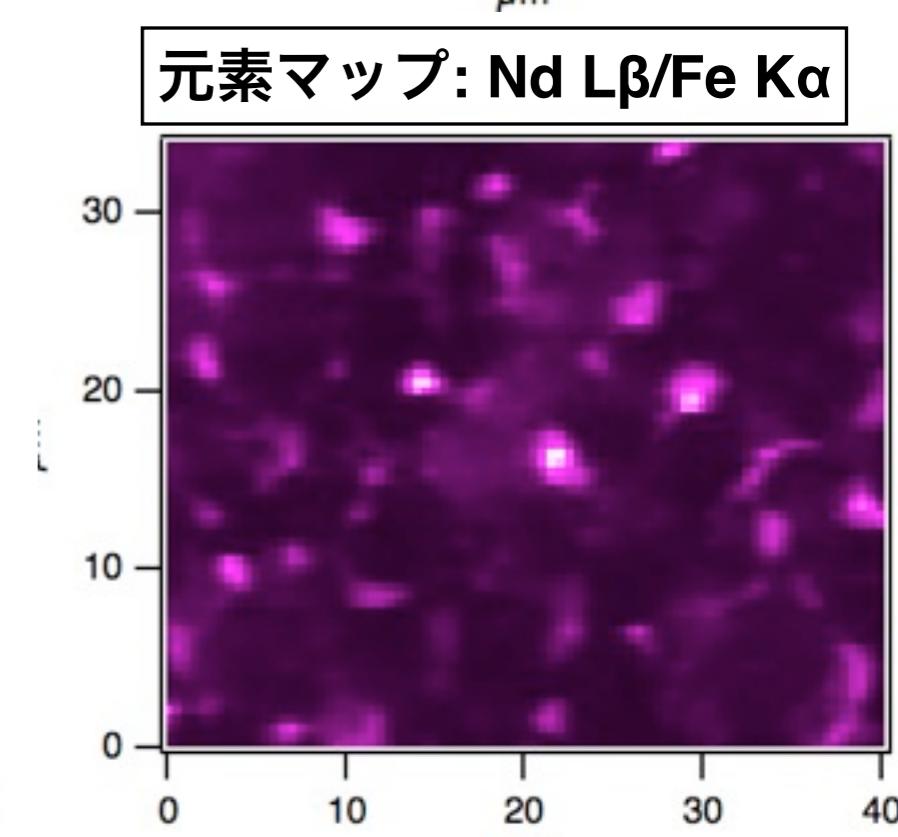
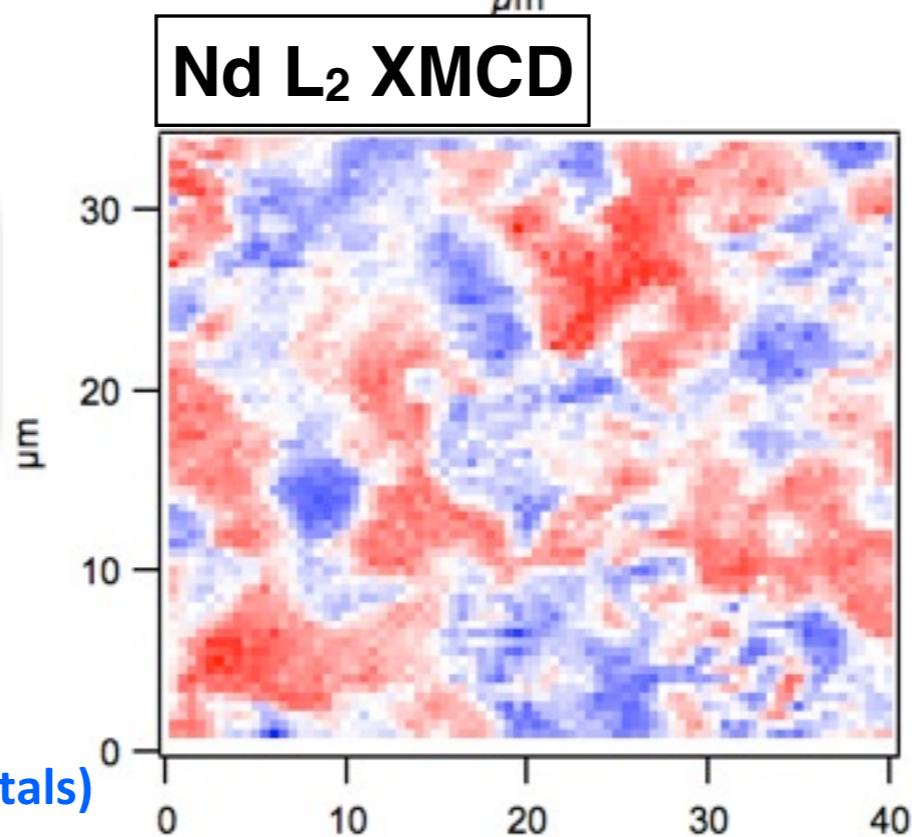
磁気特性と、ドット形状・直径、配向性との相関を調査

$\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 焼結磁石: 元素・化学状態・磁気イメージング

SEM像
(破断面)

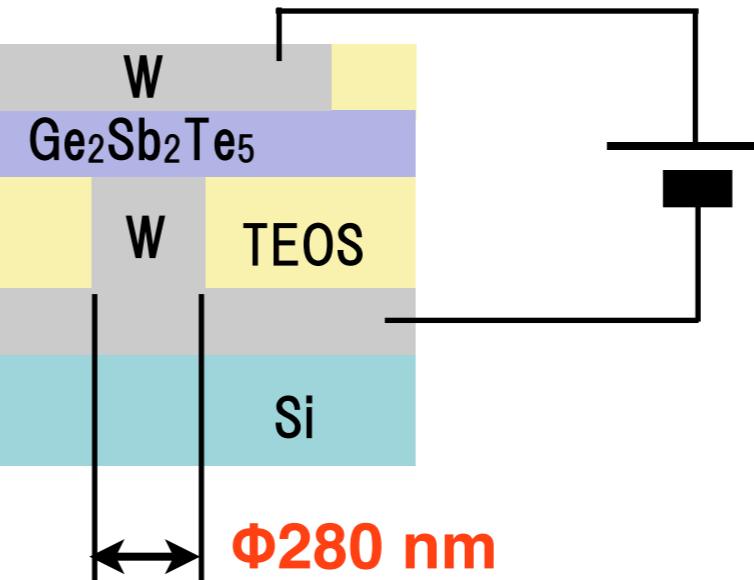
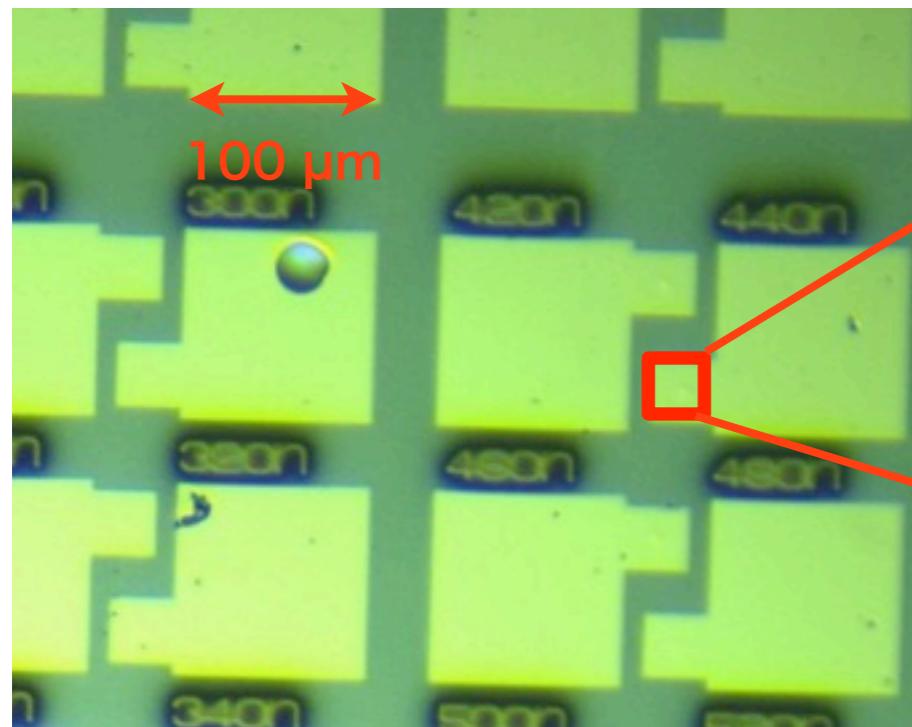


走査型XMCD像
→バルク試料の磁区構造



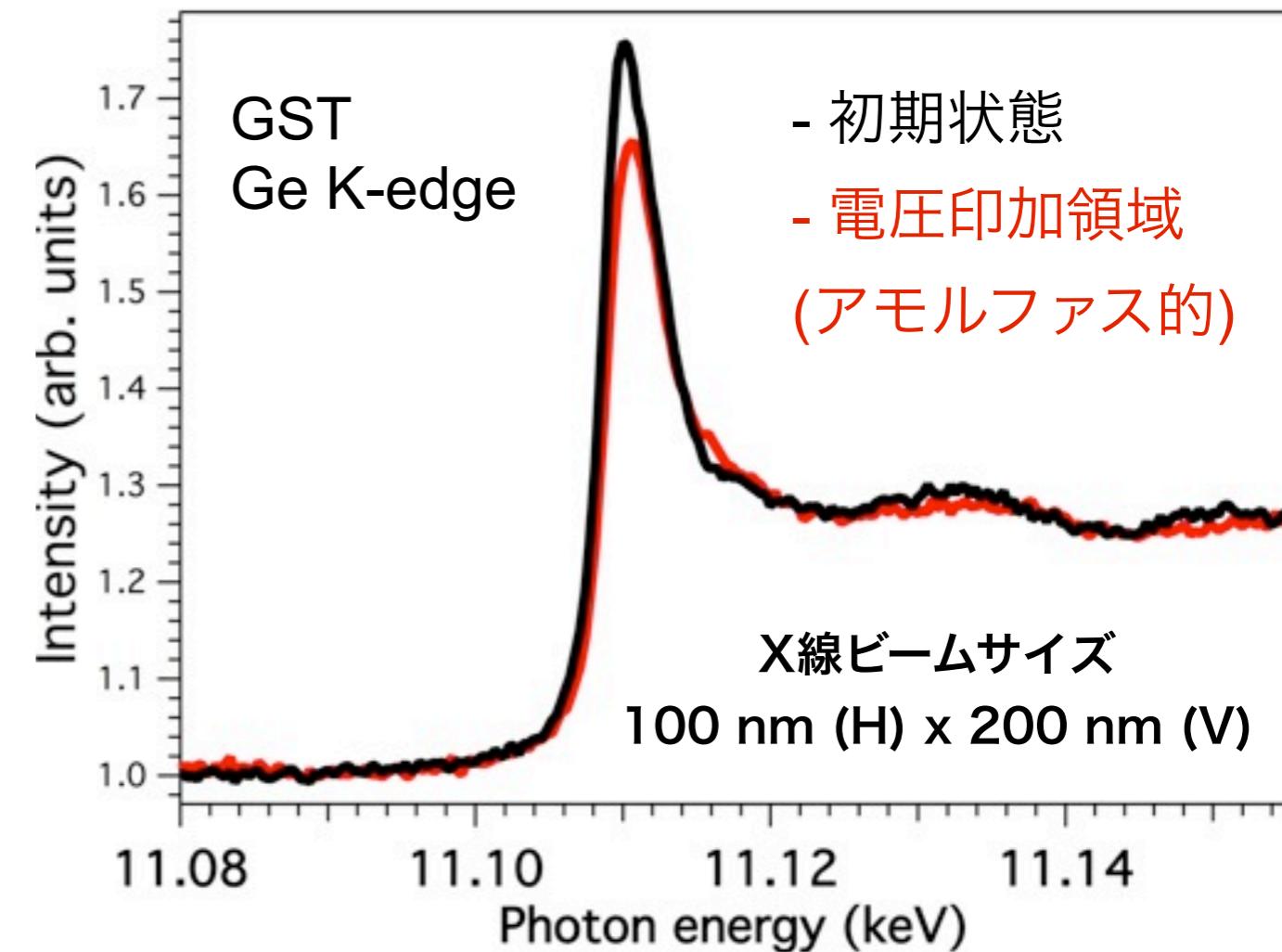
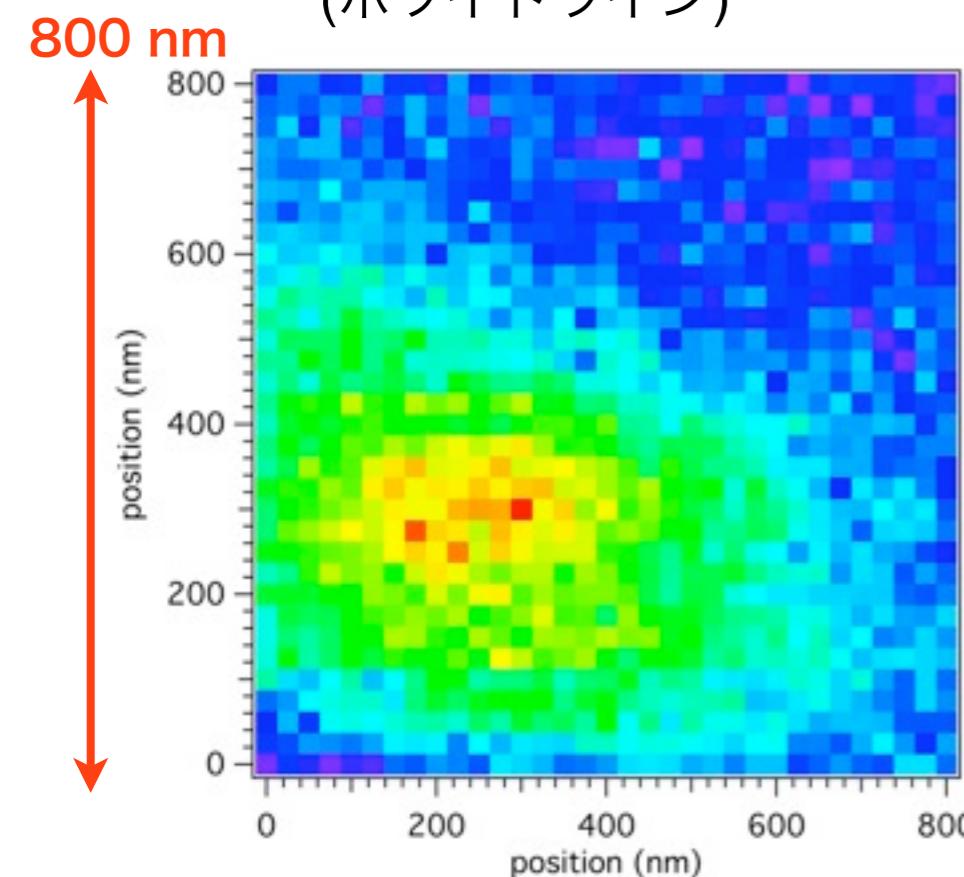
相変化メモリデバイス (P-RAM) のナノXAFS解析

P. フォンス (産総研)



electrically switched cell, 280 nm device

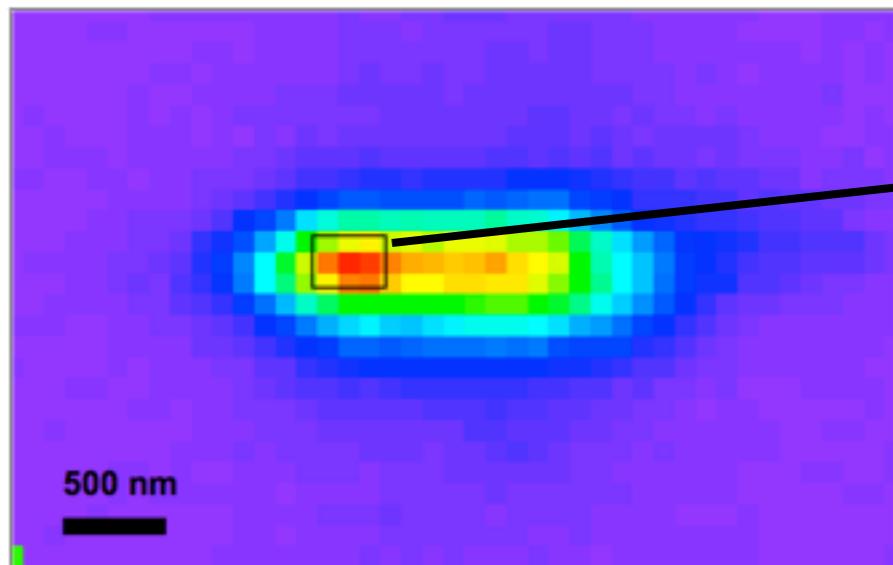
蛍光X線マップ at 11. 111 keV
(ホワイトライン)



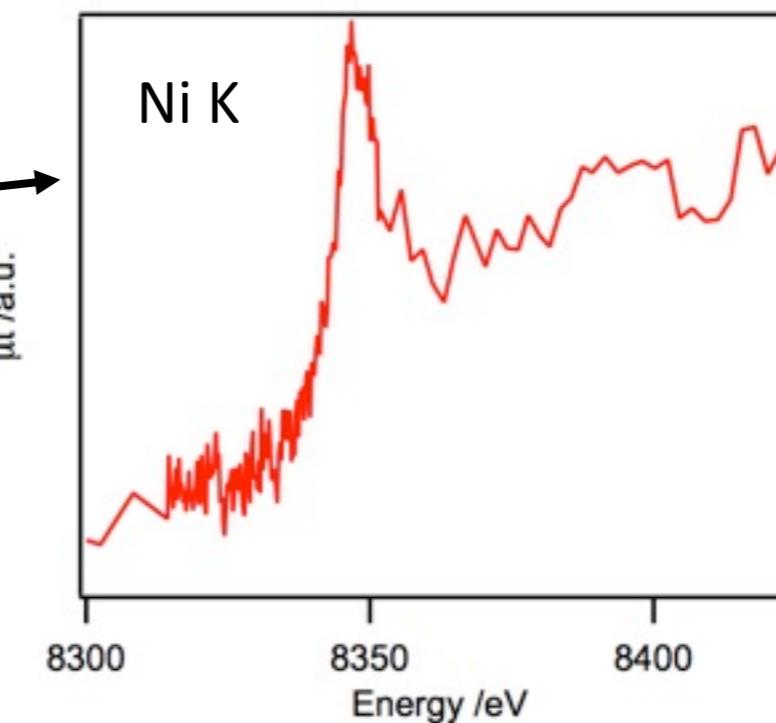
NiO_x/Ce₂Zr₂O触媒単粒子のXAFS解析

M. Tada, N. Ishiguro (IMS)

2D map of Ni K α fluorescence



XANES of the selected part of a catalyst particle



Sample:

NiO_x/Ce₂Zr₂O_y catalyst

particle

Particle size:

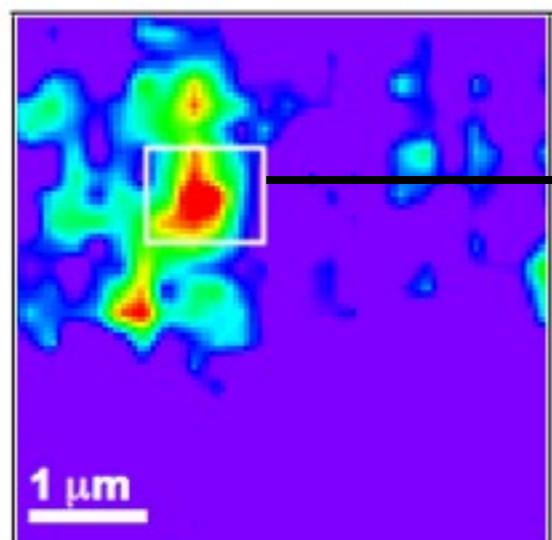
750 ± 360 nm (SEM)

X-ray beam size:

0.35 (h) x 0.25 (v) μm

Acquisition time: **13 min**

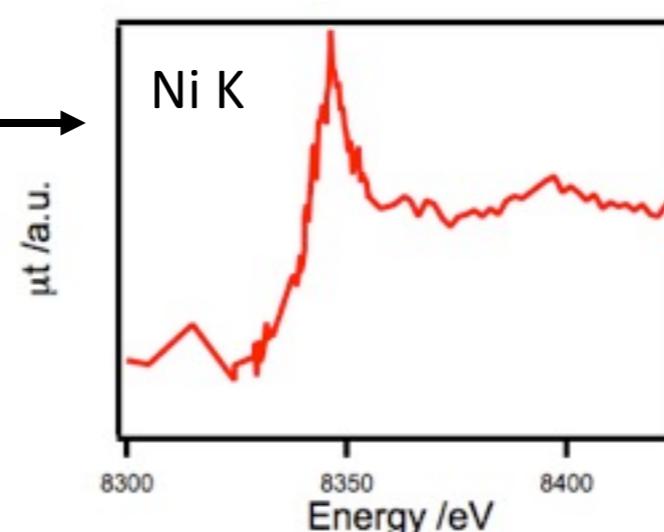
2D map of Ni K α fluorescence



Boundary of the particle unclear

Previous results using a micro beam

XANES of the whole part of a particle



beam size:

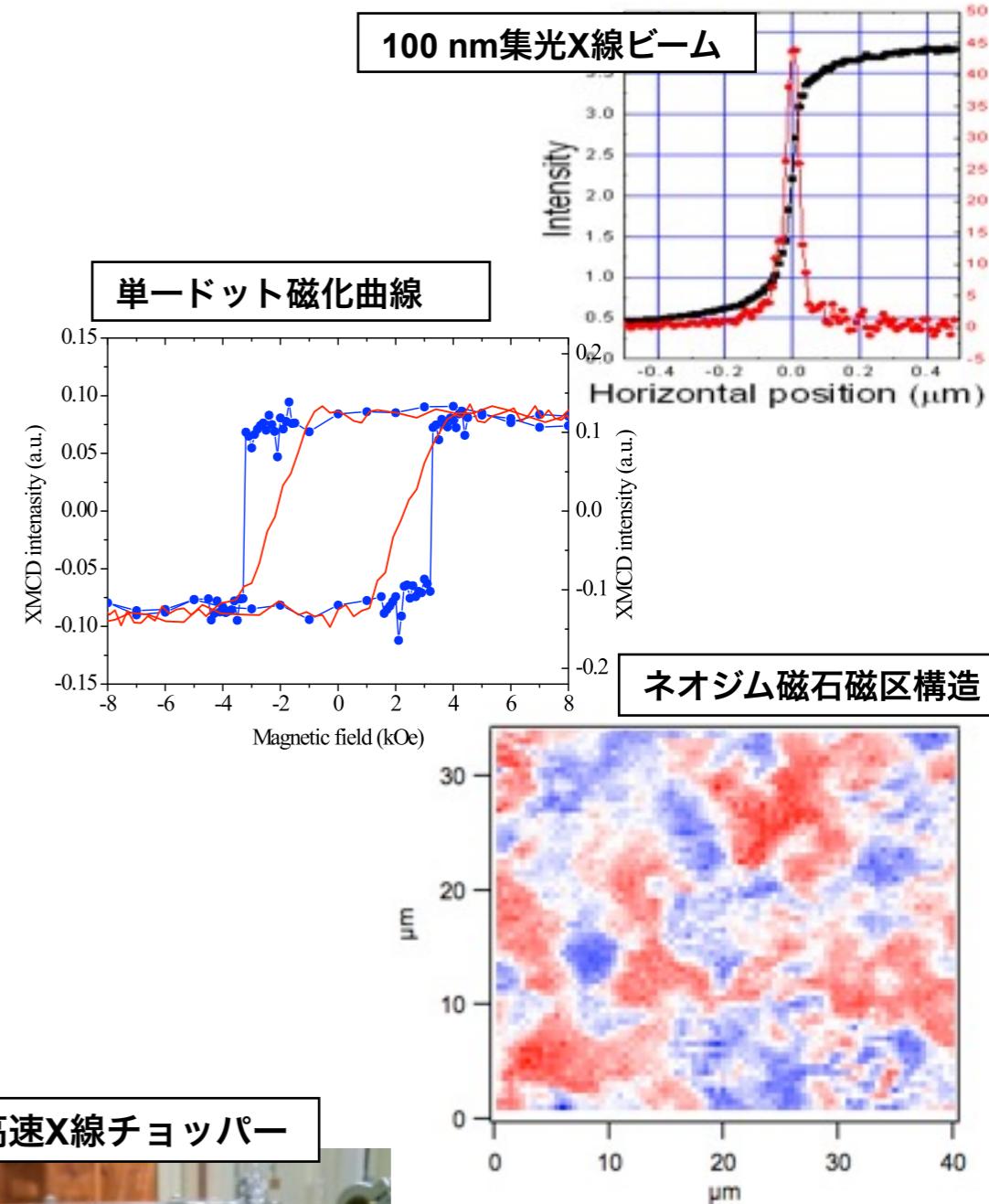
1.0 (h) x 0.8 (v) μm

Acquisition time: **45 min**

まとめ：SPring-8におけるナノビームX線磁気解析

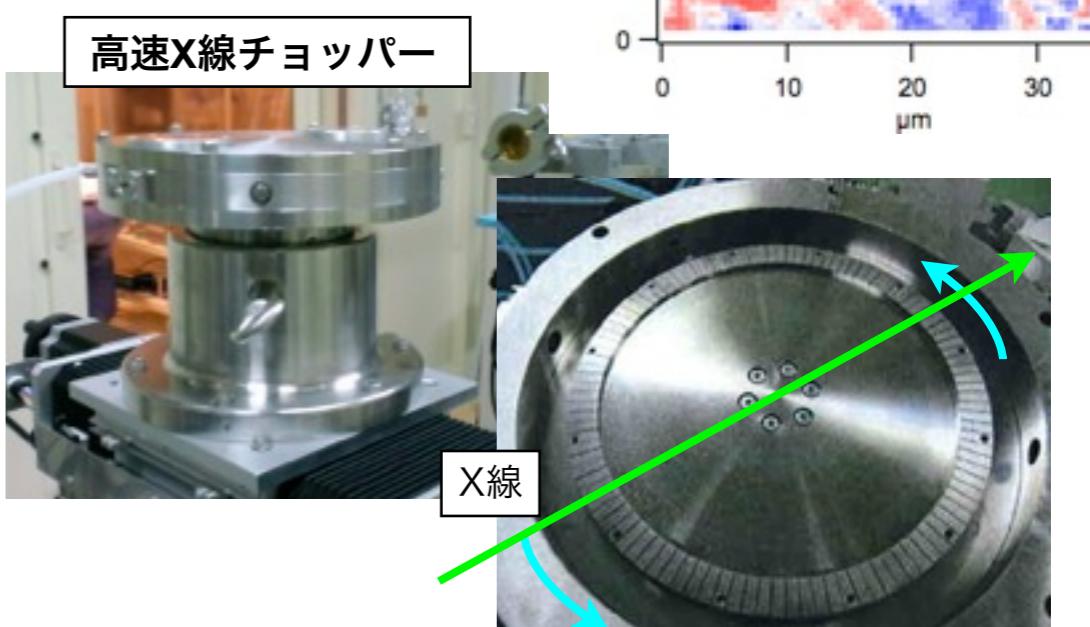
ナノXMCD磁気解析

- SPring-8 BL39XUにおいて、サブミクロン集光ビームによるXAFS, XMCDステーションを整備
- ダイヤモンド移相子による偏光制御と併用可
- 100~300 nm 空間分解能でのXAFS, XMCD分光測定を実現



今後の開発課題

- 高速X線チョッパーの開発・利用
→ 観測可能な時間領域を拡大, 効率化
- 蛍光XAFSによる深さ分解測定
- X線4D解析 (空間2次元 + 深さ方向 + 時間)



共同研究者



SPring-8 BL39XU ナノビーム分光ステーション建設



河村直己, 水牧仁一朗, 寺田靖子, 宇留賀朋哉, 藤原明比古, 山崎裕史,
湯本博勝, 小山貴久, 仙波康徳, 竹内智之, 大橋治彦, 成山展照,
竹下邦和, 木村洋昭, 松下智裕, 古川行人, 大端 通, 後藤俊治,
山本雅樹, 高田昌樹, 石川哲也 (以上 理研/JASRI)



ナノX線ビーム利用研究



近藤祐治, 有明 順 (秋田産業技術センター)

J. Richter, P. Fons (産業技術総合研究所), 大沢仁志 (JASRI)



関澤央輝(電気通信大学), 石黒 志, 唯 美津木 (分子研)



西内武司 (日立金属), 宝野和博, 広沢 哲 (NIMS)



謝辞

- ・平成21年度 文部科学省「低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワークの整備事業」における「グリーン・ナノテク研究支援のための放射光分析基盤の整備」



- ・文部科学省 元素戦略プロジェクト<拠点形成型>「元素戦略磁性材料研究拠点」



- ・科研費 基盤研究(B) 「放射光ナノビームによるビットパターン媒体の単一素子磁気解析」